

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

"ESTUDIO NUMÉRICO Y SIMULACIÓN PARA LA TOMA DE DATOS DE IMPACTO DEBIDO AL COLAPSO DE CAVIDADES SOBRE SUPERFICIES BAJO CONDICIONES DE FLUJO CAVITATIVO"

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO

JUMBO AVILA ANDERSON RAPHAEL

anderson.jumbo@epn.edu.ec

DIRECTOR: ING. HIDALGO DÍAZ VÍCTOR HUGO, DSc. victor.hidalgo@epn.edu.ec

CODIRECTOR: ING. RODAS BENALCAZAR ANA VERONICA MSc.

ana.rodas@epn.edu.ec

Quito, agosto de 2018

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo fue desarrollado por ANDERSON RAPHAEL JUMBO ÁVILA, bajo nuestra supervisión.

Ing. Víctor Hugo Hidalgo, DSc.

DIRECTOR DE PROYECTO

Ing. Ana Verónica Rodas, MSc.

CODIRECTOR DE PROYECTO

DECLARACIÓN

Yo, **Anderson Raphael Jumbo Ávila**, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual correspondiente a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente.

Anderson R. Jumbo A.

AGRADECIMIENTO

A mis padres Quimena y Marcial, que siempre me han brindado su apoyo incondicional en todas las etapas de mi vida.

A mis hermanos César, Raúl, Bryan, Juan y Alisson, que han estado a mi lado a pesar de los problemas y dificultades.

A todos mis amig@s, sin excluir a ninguno, pero en especial a Rous, Kathys, Julio, Gabriel, por todos esos momentos que hemos pasado juntos y han estado conmigo, aunque sea solo para joder.

A mis directores de tesis Víctor Hidalgo y Ana Rodas, quienes con sus conocimientos, experiencia, paciencia y motivación han logrado que pueda terminar con éxito mis estudios.

También a la Facultad de Ingeniería Mecánica, que me formó como profesional.

ÍNDICE

CERTIF	FICACIÓN	i
DECLA	RACIÓN	ii
AGRAD	ECIMIENTO	iii
Índice d	e Figuras	vi
Índice d	e tablas	. viii
Glosario	o de términos	ix
RESUM	IEN	xi
ABSTR	ACT	xii
INTRO	DUCCIÓN	1
Objetiv	o general	2
Objetiv	os específicos	2
Alcance	e	2
1.	MARCO TEÓRICO	3
1.1.	Conceptos básicos	3
1.1.1.	Cavitación	3
1.1.2.	Número de cavitación	3
1.1.3.	Núcleos de cavitación	4
1.1.4.	Colapso de la burbuja	5
1.1.5.	Parámetros que producen cavitación	6
1.2.	Tipos de cavitación	6
1.2.1.	Supercavitación	7
1.2.2.	Cavitación de lámina (Partial cavitation)	8
1.2.3.	Cavitación de hilo	9
1.2.4.	Cavitación de vórtice	. 10
1.3.	Efectos de la cavitación	. 11
1.3.1.	Ruido producido por cavitación	. 11
1.3.2.	Aparición de fuerzas adicionales	. 12
1.3.3.	Erosión por cavitación	. 12
1.4.	Investigaciones realizadas	. 13
1.5.	Sensores para medición de esfuerzos	. 14
1.5.1.	Sensores Piezoeléctricos	. 15
1.5.2.	Sensores piezoresistivos	. 16
2.	METODOLOGÍA	. 17
2.1.	Presiones en el sistema	. 17
2.1.1.	Antecedentes	. 17
2.1.2.	Descripción de Paraview	. 19
2.1.3.	Funciones de Paraview usadas	. 19
2.1.4.	Descripción del ala y condiciones iniciales	. 20

2.1.5.	Zonas de presión máxima	21
2.1.6.	Tamaño del sensor	23
2.2.	Sensores	24
2.2.1.	Número de sensores y ubicación	24
2.2.2.	Recubrimiento de un sensor	25
2.3.	Simulación del sensor	26
2.3.1.	Sensor piezoeléctrico PVDF	26
2.3.2.	Sensor piezoresistivo de manganina	
2.4.	Acondicionamiento de los sensores	31
2.4.1.	Sensor piezoeléctrico PVDF	31
2.4.2.	Sensor piezoresistivo de manganina	
2.5.	Tarjeta de adquisición de datos	
2.6.	Ambiente de simulación	
2.7.	Evolución del área afectada	40
2.8.	Análisis de costos	
2.9.	Evaluación y selección de la mejor alternativa	43
3.	RESULTADOS Y DISCUSIÓN	
3.1.	Graficas usando sensores PVDF	
3.2.	Graficas usando sensores piezoresistivos de manganina	
3.3.	Análisis espectral	
3.4.	Selección de la mejor alternativa	50
3.5.	Evolución del área afectada por la cavitación	51
3.6.	Comparación para validación	51
3.6.1.	Antecedentes	51
3.6.2.	Validación	52
3.6.3.	Comparación	54
4.	CONCLUSIONES	55
Refere	ncias Bibliográficas	

Índice de Figuras

	3
Figura 1.2. Proceso de evolución de los núcleos.	5
Figura 1.3. Clasificación de los tipos de cavitación.	7
Figura 1.4. Proceso de supercavitación en un torpedo.	8
Figura 1.5. (a) Cavitación parcial, (b) Supercavitación.	9
Figura 1.6. Región de cierre de una cavitación parcial	9
Figura 1.7. Transformación de la estela durante la cavitación	10
Figura 1.8. Cavitación de vórtice en el tubo de aspiración de una turbina Francis	11
Figura 1.9. Señales acústicas producidas por la cavitación	11
Figura 1 10 Efectos de elevación y arrastre a) Previo a la cavitación b) Cavitación	• •
desarrollada	12
Figura 1 11 Cuadro de selección del sensor	14
Figura 1.12. Clasificación de los sensores estudiados	15
Figura 1 13 Illustración de una galga PVDF	16
Figura 1.14. Sensor niezoresisitivo	16
Figura 1.15. Sensor piezoeléctrico de manganina	16
Figura 2.1. Diagrama de fluio de la medición de presiones de impacto	17
Figura 2.2. Validación del modele de orosión propuesta por Hidalgo	10
Figura 2.2. Valuación del modelo de elosión propuesta por Filuargo	10
Figura 2.5. Diagrama del proceso de obtención de la presión del jet.	10
Figura 2.4. Ala convexa sola	20
Figura 2.5. Ala convexa con obstaculo.	20
Figura 2.6. Diagrama de presiones maximas.	22
Figura 2.7. Valore maximos de presiones de impacto sobre el ala	22
Figura 2.8. Zona de presiones máximas.	22
Figura 2.9. Relación entre tamaño del transductor y tamaño de la burbuja que colaps	sa.
Figure 2.10. Veriesién del veler del imposte con el temoño del transductor	23
Figura 2.10. Vanacion dei valor dei Impacio con el tamano dei transductor	23
FIGURA 2 11 ZONAS DO UNICACIÓN DOI SONSOF MIDDIDAS ON MM VISO CUMUNIO OLICTITORIO.	
rigura 2.11. Zonas de ubicación del sensor. Medidas en nim y se cumple el citerio	05
espejo	25
espejo Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos	25 25
 Figura 2.11. Zonas de ubicación del sensor: medidas en min y se cumple el cineno espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos. Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. 	25 25 26
 Figura 2.11. Zonas de discación del sensor: medidas en min y se cumple el citterio espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. 	25 25 26 27
 Figura 2.11. Zonas de docación del sensor: medidas en min y se cumple el cineno espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos. Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. 	25 25 26 27 28
 Figura 2.11. Zonas de discación del sensor: medidas en min y se cumple el citterio espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. 	25 25 26 27 28 29
 Figura 2.11. Zonas de docación del sensor: Medidas en min y se cumple el cineno espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos. Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de 	25 25 26 27 28 29
 Figura 2.11. Zonas de docación del sensor: Medidas en min y se cumple el citterio espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina. 	25 25 26 27 28 29 30
 Figura 2.11. Zonas de discación del sensor: medidas en nim y se cumple el cineno espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina. Figura 2.18.Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 2 de 	25 25 26 27 28 29 30
 Figura 2.11. Zonas de discación del sensor: medidas en nim y se cumple el cineno espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina. Figura 2.18.Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 2 de manganina. 	25 25 26 27 28 29 30
 Figura 2.11. Zonas de discación del sensor: Medidas en film y se cumple el citterio espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina. Figura 2.18.Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 2 de manganina. Figura 2.19. Proceso de acondicionamiento del sensor PVDF. 	25 25 26 27 28 29 30 31 32
 Figura 2.11. Zonas de discación del sensor: medidas en nim y se cumple el citterio espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina. Figura 2.18.Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 2 de manganina. Figura 2.19. Proceso de acondicionamiento del sensor PVDF. Figura 2.20. Amplificador de carga ideal. 	25 25 26 27 28 29 30 31 32 32
 Figura 2.11. Zonas de docación del sensor: medidas en nim y se comple el citterio espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina. Figura 2.18.Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 2 de manganina. Figura 2.20. Amplificador de carga ideal. Figura 2.21. Diagrama de un integrador de carga real. 	25 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32
 Figura 2.11. Zonas de discación del sensor: medidas en nim y se cumple el citterio espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina. Figura 2.18.Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 2 de manganina. Figura 2.19. Proceso de acondicionamiento del sensor PVDF. Figura 2.20. Amplificador de carga ideal. Figura 2.21. Diagrama de un integrador de carga real. Figura 2.22. Integrador de carga modelo CI-50-0.1. 	25 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 33
 Figura 2.11. Zonas de doicación del sensor: Medidas en film y se cumple el citterio espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos. Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina. Figura 2.18.Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 2 de manganina. Figura 2.19. Proceso de acondicionamiento del sensor PVDF. Figura 2.20. Amplificador de carga ideal. Figura 2.21. Diagrama de un integrador de carga real. Figura 2.23. Gráfica de voltaie vs. tiempo del sensor 1. 	25 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 33 34
 Figura 2.11. Zonas de ubicación del sensor: Nedidas en finin y se cumple el citterio espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos. Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina. Figura 2.18. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 2 de manganina. Figura 2.20. Amplificador de carga ideal. Figura 2.21. Diagrama de un integrador de carga real. Figura 2.23. Gráfica de voltaje vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.24. Grafica de voltaje vs. Tiempo del sensor 1. 	25 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 33 34 34
 Figura 2.11. Zonas de doicación del sensor: medidas en nim y se cumple el citerio espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos. Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina. Figura 2.18. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 2 de manganina. Figura 2.20. Amplificador de carga ideal. Figura 2.21. Diagrama de un integrador de carga real. Figura 2.23. Gráfica de voltaje vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.24. Grafica de voltaje vs. Tiempo del sensor 2. 	25 25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 33 34 34 35
 Figura 2.11. Zonas de doicación del sensor: medidas en min y se cumple el citterio espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos. Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina. Figura 2.18.Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 2 de manganina. Figura 2.20. Amplificador de carga ideal. Figura 2.21. Diagrama de un integrador de carga real. Figura 2.22. Integrador de carga modelo CI-50-0.1. Figura 2.23. Gráfica de voltaje vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.24. Grafica de voltaje vs. Tiempo del sensor 2. Figura 2.25. Acondicionamiento sensor piezoresistivo de manganina. Figura 2.26. Fuente de pulsos piezoresistiva CK2-50 	25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 33 34 34 35 35
 Figura 2.11. Zonas de doicación del sensor: medidas en min y se cumple el citterio espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos. Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina. Figura 2.18.Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 2 de manganina. Figura 2.20. Amplificador de carga ideal. Figura 2.21. Diagrama de un integrador de carga real. Figura 2.23. Gráfica de voltaje vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.24. Grafica de voltaje vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.25. Acondicionamiento sensor piezoresistivo de manganina. Figura 2.26. Fuente de pulsos piezoresistiva CK2-50. Figura 2.27. Puente del circuito utilizado en la fuente de pulsos 	25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 35
Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos. Figura 2.13. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina. Figura 2.18.Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 2 de manganina. Figura 2.19. Proceso de acondicionamiento del sensor PVDF. Figura 2.20. Amplificador de carga ideal. Figura 2.21. Diagrama de un integrador de carga real. Figura 2.23. Gráfica de voltaje vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.24. Grafica de voltaje vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.25. Acondicionamiento sensor piezoresistivo de manganina. Figura 2.26. Fuente de pulsos piezoresistiva CK2-50. Figura 2.27. Puente del circuito utilizado en la fuente de pulsos. Figura 2.28. Gráfica Voltaje vs. tiempo Sensor 1.	25 26 27 28 29 30 31 32 32 32 33 34 35 35 36
Figura 2.11. Zonas de ubicación del sensor. Medidas en min y se cumple el citterio espejo	25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 35 36 36
Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina Figura 2.18. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 2 de manganina Figura 2.19. Proceso de acondicionamiento del sensor PVDF Figura 2.20. Amplificador de carga ideal Figura 2.21. Diagrama de un integrador de carga real. Figura 2.22. Integrador de carga modelo CI-50-0.1. Figura 2.23. Gráfica de voltaje vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.24. Grafica de voltaje vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.25. Acondicionamiento sensor piezoresistivo de manganina. Figura 2.26. Fuente de pulsos piezoresistiva CK2-50. Figura 2.27. Puente del circuito utilizado en la fuente de pulsos. Figura 2.29. Gráfica Voltaje vs. tiempo. Sensor 1. Figura 2.29. Gráfica voltaje vs. tiempo. Sensor 2. Figura 2.29. Gráfica voltaje vs. tiempo. Sensor 2. Figura 2.30. Proceso de acondicionamiento sensor 2. Figura 2.30. Proceso de acondicionamiento sensor 2. Figura 2.30. Proceso de acondicionamiento sensor 2. Figura 2.30. Proceso de acondicionensor 3. Figura 2.30. Proceso de acondizionensor 3. Figura 3.30. Proceso de acondizionensor 3. Figura 3.30. Proceso de acondizi	25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 35 36 36 37
 Figura 2.11. Zonas de docación del sensor. Medidas en nim y se cumple el citterio espejo. Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos. Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. Figura 2.14. Diagrama de flujo del proceso de Newton-Raphson. Figura 2.15. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 1. Figura 2.16. Gráfica de carga vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.17. Gráfica de resistencia vs. tiempo del sensor piezoresistivo 1 de manganina. Figura 2.19. Proceso de acondicionamiento del sensor piezoresistivo 2 de manganina. Figura 2.20. Amplificador de carga ideal. Figura 2.21. Diagrama de un integrador de carga real. Figura 2.22. Integrador de carga modelo CI-50-0.1. Figura 2.23. Gráfica de voltaje vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.24. Grafica de voltaje vs. tiempo del sensor 2. Figura 2.25. Acondicionamiento sensor piezoresistivo de manganina. Figura 2.26. Fuente de pulsos piezoresistiva CK2-50. Figura 2.27. Puente del circuito utilizado en la fuente de pulsos. Figura 2.29. Gráfica voltaje vs. tiempo. Sensor 1. Figura 2.29. Gráfica voltaje vs. tiempo. Sensor 1. Figura 2.29. Gráfica voltaje vs. tiempo. Sensor 2. Figura 2.29. Gráfica voltaje vs. tiempo. Sensor 1. Figura 2.20. Gráfica voltaje vs. tiempo. Sensor 1. Figura 2.29. Gráfica voltaje vs. tiempo. Sensor 1. Figura 2.29. Gráfica voltaje vs. tiempo. Sensor 1. Figura 2.29. Gráfica voltaje vs. tiempo. Sensor 2. Figura 2.20. Gráfica voltaje vs. tiempo. Sensor 2. Figura 2.30. Proceso de adquisición de datos. 	25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 35 36 37 38

Figura 2.32. Pantalla principal del visualizador.	38
Figura 2.33. Pantalla de "Menú principal"	39
Figura 2.34. Pantalla de conexiones.	39
Figura 2.35. Visualizador de gráficas.	40
Figura 2.36. Pantalla de "Más información".	40
Figura 2.37. Área afectada por la cavitación. Valores en [Pa]	41
Figura 2.38. Proceso de cavitación para el primer caso con obstáculo. Valores en mr	n.
	41
Figura 2.39. Evolución de la cavitación y del área de impacto. Valores de long. en mi	m. 41
Figura 3.1. Gráficas de Presión vs. Tiempo de los datos del estudio numérico y los	
datos de salida de los sensores PVDF.	46
Figura 3.2. Gráficas Presión vs. Tiempo del estudio numérico y los datos de salida de	е
los sensores PVDF para el segundo valor de mayor presión	47
Figura 3.3. Gráficas de Presión vs. Tiempo de los datos del estudio numérico y los	
datos de salida del sensor 1 piezoresistivo	48
Figura 3.4. Gráficas de Amplitud vs. Tiempo de los datos del estudio numérico y de la	os
datos de salida del sensor 1 PVDF	49
Figura 3.5. Gráficas de Amplitud vs. Tiempo de los datos del estudio numérico y de la	os
datos de salida del sensor 2 PVDF	50
Figura 3.6. Área de picadura vs. Fuerza de impacto.	53
Figura 3.7. Comparación entre resultados experimentales y resultados de la simulaci del sensor.	ión 54

Índice de tablas

Tabla 2.1. Propiedades mecánicas del acero inoxidable X5 Cr Ni 13.4 [5]	21
Tabla 2.2. Variables v condiciones del medio	21
Tabla 2.3. Características mínimas de los sensores	24
Tabla 2.4. Características de sensores analizados	21
Tabla 2.5. Valores generados por el sensor 1	. 2 न ว0
Table 2.6. Velores generados por el sensor 2.	.20
Tabla 2.0. Valores generados por el sensor Z	. 29
Tabla 2.7. Galaciensiicas dei sensor Nino-50-ER-25 [20]	. 29
Tabla 2.8. Valores generados por el sensor plezoresistivo 1.	. 30
Tabla 2.9 Valores generados por el sensor piezoresistivo 2.	. 31
Tabla 2.10. Características de los elementos de acondicionamiento.	. 33
Tabla 2.11. Características del integrador de carga modelo CI-50-01	. 33
Tabla 2.12 Valores de voltaje generados por el puente en el sensor 1	. 36
Tabla 2.13. Valores de voltaje generados por el puente en el sensor 2	. 36
Tabla 2.14. Condiciones de operación y evolución de la cavidad	.42
Tabla 2.15. Costos de referencia para la obtención de datos de impacto al usar un	
sensor PVDF.	.42
Tabla 2.16. Costos de referencia para la obtención de datos de impacto al usar un	
sensor piezoresistivo.	.42
Tabla 2 17 Evaluación del peso específico de cada criterio	44
Tabla 2 18. Evaluación del peso específico del criterio fiabilidad	44
Tabla 2 19. Evaluación del peso específico del criterio velocidad de respuesta	44
Tabla 2.20. Evaluación del peso específico del criterio rango	44
Tabla 2.20. Evaluación del peso específico del criterio tamaño	<u> </u>
Tabla 2.22. Evaluación del peso específico del criterio casta	. 44
Table 2.22. Evaluation del peso especifico del chieno costo	.45
	.45
Tabla 3.1. Condiciones de operación y evolución de la cavidad.	. 51
Tabla 3.2. Condiciones de operación experimental	. 52

Glosario de términos.

σ	Número de cavitación.
ρι	Densidad del líquido.
U_{∞}	Velocidad del fluido en la entrada.
P _v	Presión de vapor.
δt	Tiempo de colapso de la burbuja.
R _{max}	Radio máximo de la burbuja.
P _{máx,min}	Presión máxima y mínima de trabajo.
Po	Presión inicial.
A _s	Área de sensor.
P _{ext}	Presión externa o de los alrededores.
$\alpha_{o,f}$	Fracción de volumen, inicial y final respectivamente.
γ	Valor adimensional desde el centro de la burbuja hasta la pared.
C _{agua}	Velocidad del sonido en el agua.
P _{jet}	Presión del jet.
U _{jet}	Velocidad del jet.
AoB	Ángulo de incidencia
σ_{es}	Esfuerzo
$\sigma_{es.max1,2}$	Esfuerzo máximo en la zona 1 y 2 respectivamente.
$\sigma_{es.min1,2}$	Esfuerzo mínimo en la zona 1 y 2 respectivamente.
Q	Carga
А	Área analizada
$ ho_m$	Densidad del material
E	Módulo de Young
σ_R	Resistencia a la tracción
f	Frecuencia de trabajo.
A _{si}	Área mínima.
f _s	Frecuencia del sensor.

To	Temperatura de trabajo.
R _P	Rango de presión.
es	Espesor de lámina.
t _{res}	Tiempo de respuesta.
Q _{máx 1,2}	Carga máxima en la zona 1 y 2 respectivamente.
Q _{min 1,2}	Carga mínima en la zona 1 y 2 respectivamente.
R _{cu}	Resistencia de pin de soldadura.
R _o	Resistencia interna.
R _{máx 1,2}	Resistencia máxima en la zona 1 y 2 respectivamente.
R _{min 1,2}	Resistencia mínima en la zona 1 y 2 respectivamente.
С	Capacitancia del transductor.
C ₂	Capacitancia del amplificador.
Ν	Cantidad de sensores.
Р	Cambio de presión.
R	Resistencia amplificador.
P _r	Presión en un punto de referencia.

RESUMEN

En el presente trabajo se estudió las formas para medir esfuerzos producidos por la implosión de cavidades que generalmente tiene efectos negativos sobre la turbomaquinaria. El estudio se enfocó en un ala hidrodinámica convexa con un obstáculo semicilíndrico para definir el sensor más adecuado, su tamaño, cantidad y ubicación. El conocimiento de la zona de los daños producidos por cavitación ayudará al mejoramiento de diseños y aumento de la vida útil de las máquinas hidráulicas.

Para los propósitos establecidos se realizó el estudio numérico que permitió determinar la magnitud de las presiones de impacto, partiendo del trabajo "Numerical study on unsteady cavitating Flow and erosion based on homogeneous mixture assumption" y usando el modelo de cavitación propuesto. La simulación de los sensores se realiza mediante el uso de las curvas de calibración la cual entrega valores aproximados del comportamiento real. A continuación, se realizó el acondicionamiento necesario, el cual permite transmitir las señales captadas para poder visualizar la presión en una interface desarrollada para el efecto. Para justificar el uso de los dos sensores analizados, se tomaron como base estudios realizados en experimentos similares, pero con diferentes tipos de ala y diferentes condiciones de parámetros físicos. Para seleccionar el sensor adecuado para medir cavitación se utilizó el método ordinal corregido de criterios ponderados, en la cual se analizan determinadas características de cada solución y se asigna un valor dependiendo el orden de preferencia. Esta da como resultado que la forma aceptable para medir impactos de cavitación es el uso de sensores piezoeléctricos PVDF (Fluoruro de polivinilideno) de tamaño 6,35x6,35[mm²], además de colocar un recubrimiento de epoxi que permita proteger al sensor del agua y disminuya las alteraciones producidas por temperatura.

Finalmente, se presenta el cambio del área afectada por cavitación debido a la variación de los parámetros físicos y como influirían sobre el rendimiento de los sensores.

Palabras clave: Cavitación, simulación, PVDF, curva de calibración, acondicionamiento, área afectada.

xi

ABSTRACT

In the present work, it studied the ways to measure stress produced by the implosion of cavities that generally has negative effects on the turbomachinery. The study was focused on a convex hydrodynamic wing with a semi-cylindrical obstacle to define the most suitable sensor, its size, quantity and location. The knowledge of the area of damage produced by cavitation will help to improve designs and increase the useful life of hydraulic machines. For the established purposes, the numerical study was carried out that allowed to determine the magnitude of the impact pressures, starting from the work "Numerical study on unsteady cavitating Flow and erosion based on homogeneous mixture assumption" and using its proposed cavitation model. The simulation of the sensors performs using the calibration curves which gives approximate values of the real behavior. Then, the necessary conditioning was performed, which allows transmitting the captured signals to be able to visualize the pressure in an interface developed for the effect. To justify the use of the two sensors analyzed, studies based on similar experiments were taken as a basis, but with different wing types and different conditions of physical parameters. To select the appropriate sensor to measure cavitation, the corrected ordinal method of weighted criteria was used, in which certain characteristics of each solution are analyzed and a value is assigned depending on the order of preference. This results in that the acceptable way to measure cavitation impacts is the use of piezoelectric sensors PVDF (polyvinylidene fluoride) of size 6.35x6.35 [mm ^ 2], in addition to placing an epoxy coating that allows to protect the sensor of water and decrease the alterations produced by temperature.

Finally, the change of the area affected by cavitation is presented due to the variation of the physical parameters and how they would influence the performance of the sensors.

Keywords: Cavitation, simulation, PVDF, calibration curve, conditioning, affected area.

xii

"ESTUDIO NUMÉRICO Y SIMULACIÓN PARA LA TOMA DE DATOS DE IMPACTO DEBIDO AL COLAPSO DE CAVIDADES SOBRE SUPERFICIES BAJO CONDICIONES DE FLUJO CAVITATIVO"

INTRODUCCIÓN

Según datos del Balance Nacional de Energía Eléctrica de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, la mayor cantidad de energía eléctrica producida en el país proviene de centrales hidroeléctricas, llegando a representar el 66,89% de producción total de energía para el 2017 [2], en estas centrales se usan turbinas Francis, Pelton y Kaplan; por lo que es de vital importancia el estudio de la cavitación debido a que ocasionan problemas de ruido, vibración, daños en la superficie del material (erosión), y pérdida de eficiencia en máquinas hidráulicas como en los elementos constituyentes [3], [4]. Al analizar los problemas económicos dados por la erosión, se tiene que se generan elevados costos tanto en la reparación como en las pérdidas de ingresos debido al tiempo empleado para su reparación [4].

Como es necesario disminuir los efectos negativos causados por la cavitación se han desarrollado modelos de dinámica de fluidos computacionales (CFD), los cuales permiten predecir de mejor manera el flujo cavitativo y ayudan al mejoramiento de diseños de maquinaria hidráulica tanto en potencia específica como en ahorro de dinero.

Partiendo de los resultados obtenidos mediante simulación y usando el modelo de erosión propuesto por Hidalgo [1], se realiza el análisis para la medición de impactos debido a la implosión de cavidades sobre un ala hidrodinámica convexa con obstáculo. El estudio tiene la finalidad de determinar ubicación, características y número de sensores; además de vaticinar como sería el aumento del área de daño cambiando la velocidad del fluido y ángulo de impacto sobre este tipo de ala.

Finalmente se determina como influiría el cambio de área afectada por cavitación sobre el rendimiento de los sensores seleccionados. Todo este estudio ayudará a disminuir los costos que representaría la instalación de los mismos sin un previo análisis [4], [5].

1

Objetivo general

Estudiar y simular un dispositivo para la toma de datos de impacto de cavidades sobre superficies bajo condiciones de flujos cavitantes.

Objetivos específicos

- Identificar los principales parámetros físicos medibles, que intervienen en el proceso de cavitación en un ala dentro de un fluido acuoso requeridos para la selección del dispositivo;
- Deducir las fuerzas que van a actuar sobre el sistema generadas por el propio fluido al pasar sobre la superficie;
- Comparar los distintos mecanismos de toma de datos de impacto en la superficie bajo efectos cavitantes y selección del más adecuado para la simulación en el sistema;
- Determinar la ubicación adecuada de los transductores a utilizar, considerando las limitaciones electrónicas y constructivas del sensor;
- Visualización del sistema de medición, integrando la toma de datos teóricos con diferentes ángulos de impacto, mediante el control de la rotación de un ala dentro de un fluido acuoso;
- Visualizar en una pantalla los valores obtenidos por el sensor que puedan ser utilizados por registradores o como disparadores de niveles de alarma;
- Análisis de mecánica de fluidos para la optimización del dispositivo simulado.

Alcance

El proyecto de investigación se centra en definir el tipo de sensor, su ubicación, el número de ellos y tamaño para permitir medir las presiones provocadas por la implosión de cavidades sobre un ala hidrodinámica convexa con un obstáculo semicilíndrico bajo flujos cavitativos y con los parámetros iniciales usados por Hidalgo [1] en su disertación doctoral. Esto incluye:

- Extraer datos de simulación.
- Determinar la ecuación de las presiones producidas por la cavitación y la región afectada por la misma.
- Simular y validar el sensor utilizado para medir las presiones de impacto.
- Acondicionar el sensor y visualizar las gráficas obtenidas
- Determinar la región afectada por la cavitación al variar los parámetros físicos iniciales.

1. MARCO TEÓRICO

El concepto de cavitación fue introducido por primera vez por Leonhard Euler. La complejidad del tema requiere una secuencia de ideas que se presentan y se revisan. Primero se aborda una serie de conceptos que deben ser conocidos para entender el fenómeno. A continuación, se describe los tipos de cavitación que se generan en un ala hidrodinámica al variar el número de cavitación, el ángulo de ataque y manteniendo otras propiedades constantes. Además, se estudia los principales efectos que genera la cavitación, el cual ayuda a definir las fórmulas de impacto sobre una superficie. En las ultimas partes se revisa las investigaciones realizadas en cuanto a la medición de impactos de cavitación, para finalmente revisar los sensores que se utilizaron en el presente proyecto.

1.1. Conceptos básicos

1.1.1. Cavitación

La cavitación es la formación de burbujas de gas (cavidades) debida a la disminución de presión y el posterior colapso de estas en el seno de un líquido. El fenómeno es similar al de la ebullición, pero la diferencia radica en que en la ebullición existe un aumento en la temperatura a presión constante, mientras que en la cavitación existe una reducción de presión a una temperatura Tf constante, como se puede ver en la Figura 1.1 [6] [7].



Figura 1.1. Diferencia entre proceso de cavitación y ebullición. (Fuente: [6])

1.1.2. Número de cavitación

El número de cavitación es importante para determinar el tipo de flujo cavitativo y la relación de crecimiento de cavidades [8]. Para determinar el tipo de cavitación, este

término viene asociado con otros términos que son el número de Reynolds y ángulo de ataque, los cuales al variar me predicen el tipo de cavitación que se generará. Por ejemplo, en un ala hidrodinámica NACA 16012 a 8 grados de ángulo de ataque y número de Reynolds de 10^6, se tiene que existe supercavitación si el número de cavitación se encuentra en un rango de 0.045-0.21. El número de cavitación se define mediante:

$$\sigma = \frac{P_r - P_v}{\frac{1}{2}\rho_l U_\infty^2}$$

Ecuación 1.1. Número de cavitación. (Fuente: [8])

Donde:

- P_r Presión en un punto de referencia.
- P_v Presión de vapor a la temperatura de trabajo.
- U_{∞} Velocidad del flujo.
- ρ_l Densidad del fluido.

1.1.3. Núcleos de cavitación

Los núcleos de cavitación son puntos iniciadores del proceso de cavitación, son consideradas como microburbujas y se desarrollan previo a la presión de vapor. Su tamaño está entre unos pocos micrómetros y algunos cientos de micrómetros. Los núcleos crecen por dos razones principales [6]:

- Los núcleos libres (no unidos a la pared) aumentan debido a la gravedad.
- Por el intercambio de gas por difusión que realizan los núcleos con el gas disuelto en el líquido.

Debido a que el coeficiente de difusión del gas es lento (en el orden de un segundo), el tiempo de difusión es grande en comparación al tiempo necesario para el colapso de la burbuja (milisegundos).



Figura 1.2. Proceso de evolución de los núcleos. (Fuente: [6])

La evolución de las microburbujas se produce de la forma en que se muestra en la Figura 1.2. El núcleo empieza con una presión inicial mayor a la presión de saturación (P_v) , en el punto A, luego viaja a una zona B, en donde su presión es mucho menor que P_v y además va aumentando su tamaño, hasta que llega a un punto C (garganta) en el cual adquiere su menor presión (Pmin). El mayor tamaño de la burbuja es alcanzado en el punto D, en el cual además está en condiciones inestables, provocando la implosión violenta [9], [6].

1.1.4. Colapso de la burbuja

En el presente estudio se considera a las burbujas como esféricas debido a la simplicidad del modelo y porque esta forma se relaciona con los máximos efectos durante el colapso como son: temperatura, ruido y presión [1]. Para el tiempo de colapso característico viene dado por la siguiente ecuación [6]:

$$\begin{split} \delta t &= 0,917 \frac{R_{max}}{\sqrt{\frac{P_{ext} - P_{min}}{\rho_l}}} \\ \text{Ecuación 1.2. Tiempo de colapso de una burbuja.} \\ & (\text{Fuente: [6]}) \end{split}$$

Donde:

R_{max} Radio máximo de la burbuja en la región de presión mínima.

P_{ext} Presión exterior,

- P_{min} Presión mínima,
- ρ_l Densidad del fluido.

1.1.5. Parámetros que producen cavitación

Los principales parámetros determinados por Franc y Michel [6], que ocasionan cavitación son:

- La aspereza y la geometría de la pared, las cuales pueden generar un aumento brusco en la velocidad y una reducción en la presión, esto ocurre si se tiene restricción en el área de la sección transversal del conducto o por la curvatura impuesta en la línea de flujo.
- Las altas fluctuaciones de presión turbulenta producen cavitación en forma de hilos. Es común ver este tipo de cavitación en el extremo de las palas de una hélice de barco.
- La naturaleza inestable de ciertos flujos, como el golpe de ariete, produce caídas instantáneas de presión en ciertos puntos dando origen a la cavitación.
- Los movimientos oscilatorios y por ultrasonido; las cuales generan presiones fluctuantes. Si estas presiones tienen una amplitud grande, la cavitación puede aparecer, si se producen oscilaciones negativas.

Para predecir el inicio de la cavitación, es necesario conocer la presión y compararla con un valor que habitualmente es la presión de vapor debido al cambio de fase líquido-vapor. Para el cálculo de la presión tanto en flujos unidimensionales como en estacionarios, se utiliza la ecuación de Bernoulli. Mientras que, en flujos turbulentos, el uso de la dinámica computacional ha hecho posible predecir la generación de cavidades [6].

1.2. Tipos de cavitación

Franc y Michel en el libro "Fundamentals of cavitation" [6], clasifican los tipos de cavitación considerando un flujo bidimensional sobre un ala hidrodinámica NACA 16012 y variando el ángulo de ataque, número de cavitación y considerando un número de Reynolds fijo [6].



De la Figura 1.3, se tiene que el área gris es la zona donde no ocurre cavitación. En la zona 1, 2 y 3, se tiene que, para valores pequeños de número de cavitación, existe supercavitación para cualquier ángulo de ataque. Para la zona 4 se tiene un estado intermedio, en el que se tiene cavitación parcial. La zona 5, es la cavitación bifásica, en la cual coexiste la cavitación de hilo con la cavitación parcial y la supercavitación con la cavitación de hilo. La zona 6 es la de cavitación de hilo, en la cual se tiene altos valores tanto de ángulo como de número de cavitación. Además, se considera el estudio de cavitación de vórtice [6], [9].

1.2.1. Supercavitación

El fenómeno de la supercavitación es usado para disminuir la resistencia hidrodinámica, debido a que, al mover un objeto a gran velocidad a través de un líquido, ocasiona que el fluido a su alrededor pierda presión y en un inicio se crea la cavitación, para luego extenderse, originando que el objeto ya no se desplace a través de un líquido sino más bien a través de un gas. De esta manera se puede aumentar la velocidad de un objeto de forma significativa [9], [10]. El principal inconveniente es que el proceso de supercavitación no es fácil de controlar, por lo tanto, un objeto que quiera reproducir este fenómeno debe alcanzar velocidades mayores a 45 [m/s] para producir y mantener la burbuja de cavitación. Además, una vez que se llega a la velocidad indicada, el direccionamiento del objeto es de gran dificultad para controlar [11].

Existen diferentes formas de lograr la supercavitación:

- Acelerando la velocidad del flujo de entrada. (más alto que 45 m/s a nivel del mar).
- Reduciendo la presión exterior. Esto es factible de forma experimental, mediante túneles de agua.
- Aumentando la presión de cavitación, mediante la inyección de gas no condensable.

Las dos primeras formas de generar cavitación se conocen como supercavitación natural. Y la tercera forma se conoce como supercavitación artificial [12].



Figura 1.4. Proceso de supercavitación en un torpedo. (Fuente: [13])

1.2.2. Cavitación de lámina (Partial cavitation)

Se conoce como cavitación inestable de lámina, al tipo de cavitación que se cierra sobre la superficie de una lámina, como se muestra en la Figura 1.5. (a). Usualmente se genera desde el borde de ataque en el lado de la succión de un ala hidrodinámica con un ángulo de incidencia positivo. Uno de los parámetros más importantes para este tipo de cavitación es el ángulo de ataque ya que dependiendo de este parámetro, se presenta de diferentes formas la cavidad, teniendo una presión de flujo libre dada [6].

Se producen generalmente en dos situaciones prácticas, la primera es sobre hélices y en bombas. En el caso de un ala hidrodinámica, como se observa en la Figura 1.5, a medida que disminuye el número de cavitación, la cavidad se va extendiendo sobre la superficie y en ocasiones se extiende a su tamaño original, convirtiéndose la cavitación parcial en supercavitación [6], [14].



El limite o cierre de la cavitación parcial se produce debido a que la presión dentro de la cavidad es menor, por lo que la curvatura de las líneas de corriente tienden a dirigirse hacia la cavidad, haciendo que el flujo se divida en dos partes: el chorro reentrante que va llevando una pequeña cantidad de líquido al interior de la cavidad y un caudal exterior que vuelve a fijarse a la pared. Estas dos partes pueden observarse en la Figura 1.6 y se da en cavidades delgadas, donde el contraflujo del líquido es pequeño. Si se tiene una cavidad gruesa, el chorro reentrante puede incluso tener mucho más impulso para alcanzar la parte frontal de la cavidad, ocasionando la separación de la cavidad para después arrastrar a las cavidades aguas abajo [6].



Figura 1.6. Región de cierre de una cavitación parcial. (Fuente: [6])

Una de las etapas de la cavitación inestable de lámina es la nube de cavitación. Se producen por la separación de la cavidad de la superficie del ala, debido a las oscilaciones del volumen de la cavidad, cuando la longitud de la cavidad excede un valor específico de la geometría [12]. Esta etapa de cavitación afecta fuertemente en el funcionamiento hidrodinámico y produce vibración, ruido y erosión.

1.2.3. Cavitación de hilo

Bair y Winer fueron los primeros en proponer que la cavitación puede ocurrir en flujos de corte cuando el esfuerzo de corte excede la presión [15]. Este tipo de cavitación está presente en estelas y chorros sumergidos con altos números de Reynolds, además en regiones separadas las cuales se desarrollan en alas con ángulos de ataque elevados. El inicio y desarrollo de la cavitación en flujos de corte es controlado por su estructura no cavitante. Tales flujos están limitados por regiones de alto corte donde la vorticidad es producida. Como resultado, se forman estructuras rotacionales

y el nivel de presión cae en los núcleos de los vórtices, los cuales se convierten en potenciales sitios de cavitación [6], [9], [16].

Para el estudio del desarrollo de la cavitación, se considera obstáculos con bordes afilados como las cuñas, debido a que el punto de separación de la capa límite es fijo. Cuando la cavitación ocurre, las estelas aparecen y tienen tres diferentes formas y tienen tres diferentes formas de acuerdo con la distancia desde la cuña como se observa en la Figura 1.7 [6].



Figura 1.7. Transformación de la estela durante la cavitación (Fuente: [6]).

En la estela cercana, los vórtices de pequeña escala se vierten periódicamente en las dos capas de corte que se originan en los bordes de salida de cuña.

La estela lejana está compuesta por los clásicos vórtices clásicos 2D Bénard-Kármán. Estos están conectados entre sí por filamentos de vórtice 3D en sentido de la corriente que describe en condiciones no cavitantes [6]. También se tiene una región de transición que en la mayoría de los casos está compuesta por una mezcla de dos fases, además en esta región los vórtices de pequeña escala dan lugar a vórtices de gran escala [6].

1.2.4. Cavitación de vórtice

Brennen en el libro "Cavitation and bubble dynamics" [14] describe la cavitación de vórtice, la misma que puede ser observado en propulsores marinos, siendo por tanto la fuente primaria de avería y disminución de rendimiento del buque. Se produce cuando estructuras rotacionales generan regiones de baja presión dentro del líquido, estas regiones son llenadas con vapor, dando lugar a la cavidad. El movimiento rotacional puede ser generado por la propia turbulencia o mediante cuerpos sólidos. Este tipo de cavitación se produce con valores altos de número de cavitación, en comparación a otros tipos de cavitación [6], [14].



Figura 1.8. Cavitación de vórtice en el tubo de aspiración de una turbina Francis. (Fuente: [14])

1.3. Efectos de la cavitación

Entre los principales efectos de la cavitación están: producción de ruido, aparición de fuerzas adicionales, erosión de la pared, entre otros efectos.

Generalmente es permitido un cierto grado del desarrollo de la cavitación debido al costo que generaría el eliminar el fenómeno totalmente. La producción de la cavitación también puede ser beneficiosa como por ejemplo la utilización de la supercavitación para eliminar la fricción en el movimiento de un objeto a alta velocidad por un líquido, deposición electrolítica, producción de emulsiones, limpieza de superficies, destrucción de bacterias, entre otros [6].

1.3.1. Ruido producido por cavitación

El ruido precipitante es la evidencia más característica del fenómeno y es el resultado de las ondas de choque generadas por el colapso de las burbujas. A partir de la medición de ruido, es posible encontrar los impulsos que son a alta presión y determinar el tiempo en el cual se dio la implosión. En la Figura 1.9 se puede observar las señales producidas, los cuales corresponden al primero (tiempo cercano a 400 [μ seg]) y segundo (t cercano a 1100 [μ seg]) colapso respectivamente.



1.3.2. Aparición de fuerzas adicionales

La aparición de fuerzas adicionales también se conoce como levante y arrastre. A una velocidad de flujo constante, la elevación y arrastre de un ala hidrodinámica no varía a medida que se baja la presión, hasta que la cavitación comienza. Como se puede observar en la Figura 1.10, a medida que la cavitación se desarrolla, la elevación disminuye y el arrastre aumenta. Al tener estos cambios de levante y arrastre, hace que el flujo se vuelva bastante inestable y en ocasiones produce vibraciones severas sobre la máquina hidráulica.



1.3.3. Erosión por cavitación

De acuerdo con Peters et al. [18], el principal mecanismo de erosión es mediante las ondas de presión de alta amplitud, las cuales son generadas por la implosión de una nube de cavitación. Estas ondas viajan a través del fluido y son capaces de dañar directamente la superficie de un material. Para cuantificar los daños, Peters [18] se basó en la hipótesis de Dular y Countier-Delgosha, la que menciona que el daño en una superficie es debido al colapso de burbujas individuales que después del colapso forman microjets. La velocidad del microjet es una de las cantidades críticas para la predicción de la erosión por cavitación. Hidalgo [1] determinó la velocidad de impacto del microjet Uiet mediante:

$$U_{jet} = 8,97\gamma^{2} \sqrt{\left(\frac{P - P_{v}}{\rho_{l}}\right) \left(\frac{\alpha_{o} - \alpha_{f}}{\alpha_{o}}\right)}$$

Ecuación 1.3. Velocidad de impacto del Jet.

(Fuente: [1])

Donde:

 $\gamma = 1,1$

 $P_v = 2329,57[Pa]$

Valor adimensional desde el centro de la burbuja hasta la pared.

Presión de vapor a T=20°C, calculada con la ecuación de Antoine. [19]

 $\rho_l = 998,29 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$ Densidad del fluido (agua a T=20°C).

 $\alpha_{o,f}$ Fracción de volumen, inicial y final respectivamente.

P Cambio de presión.

La distancia para que un microjet pueda generar un alto potencial dañino [18] es la distancia de separación de $\gamma = \frac{H}{R_b} = 1,1$, donde H, es la distancia desde el centro de la burbuja a la superficie y R_b es el radio de la burbuja.

Como el impacto del microjet es considerado el principal mecanismo de daño de una superficie sólida [1], [18], [20], se tiene la presión de impacto del jet:

$$\begin{split} P_{jet} &= U_{jet} \cdot C_{agua} \cdot \rho_l \\ \text{Ecuación 1.4. Presión de impacto del jet.} \\ & (\text{Fuente: [1]}) \end{split}$$

Donde:

 $C_{agua} = 1483 \left[\frac{m}{s}\right]$ Velocidad del sonido en el agua a T=20°C, calculada con la ecuación de Randall [21].

1.4. Investigaciones realizadas

Se han realizado varios estudios para la medición de impactos debido al colapso de las burbujas, entre los más representativos están los realizados por:

- Momma y Lichtarowicz en el artículo "A study of pressures and erosion produced by collapsing cavitation" publicado en 1995 [22], presentó los resultados que se obtienen al montar un sensor de presión piezoeléctrico PVDF (fluoruro de polivinilideno) en forma de película sobre un espécimen de aluminio para medir y contar impulsos de presión de cavitación generados en un aparato de chorro cavitante. Además, erosionaron especímenes de aluminio para determinar las pérdidas de masa y producir pozos que se contaron y midieron. La erosión producida se correlacionó con el conteo de pozos y con los datos de pulso de presión [22].
- Soyoma et al.[23], en el artículo "A new calibration method for dynamically loaded transducers and its application to cavitation impact measurement" publicado en 1998, realizó investigaciones de la carga dinámica generada por el colapso de cavidades sobre una superficie, para lo cual utilizó un sensor piezoeléctrico PVDF.

Además, desarrolló un nuevo método de calibración dinámica para un sensor PVDF.

- Gustavson et al. [24], en el artículo "PVDF pressure transducers for shock wave and explosives research" mostró los estudios de la respuesta del transductor de PVDF montado en superficie y sometido a choques submarinos. Además,describió brevemente el uso de sensor piezoresistivo de manganina.
- Hujer et. al. [25], en el artículo "Impact load measurements with a PVDF pressure sensor in an erosive cavitating flow" publicado en 2015, describió la utilización de un sensor PVDF para medir los picos de presión ocasionados por el colapso de las burbujas de cavitación. Los datos registrados fueron procesados para obtener el espectro de carga de impacto para diferentes velocidades a números de cavitación constante.

1.5. Sensores para medición de esfuerzos

La presión generada por la implosión de la burbuja y el impacto del jet de agua ocasiona que en el material se forme un esfuerzo de igual magnitud ($P_{jet} = \sigma_{es}$). Para la medición del fenómeno se utilizan sensores de esfuerzo, que son dispositivos en los cuales, al tener una señal física de entrada, devuelven una señal de salida diferente. Existen varios tipos de sensores para medir impacto, pero se analizará dos tipos, los sensores piezoeléctricos y los sensores piezoresistivos, que son los que mejor se adaptan al proceso que se requiere medir como se muestra en la Figura 1.11 [26].





(Fuente: Propia)

1.5.1. Sensores Piezoeléctricos

Son elementos activos que emplean el efecto piezoeléctrico descubierto por los científicos Franceses Jacques y Pierre Curie en 1880; y consiste en la generación de cargas eléctricas por la polarización eléctrica de la masa de ciertos cristales como el cuarzo al ser sometido a un esfuerzo de deformación. La carga eléctrica generada es proporcional en amplitud y frecuencia de la fuerza aplicada [27].

Los campos eléctricos y de polarización generados por los elementos piezoeléctricos comúnmente se describen mediante vectores, a diferencia del esfuerzo y la deformación, los cuales son descritos mediante tensores. Por lo antes mencionado, las constantes piezoeléctricas cambian respecto a la dirección de deformación respecto a cada eje, con lo que se tiene que las relaciones estáticas entre las variables mecánicas y eléctricas pueden ser descritas mediante:

 $D = dT + e^{T}E$ Ecuación 1.5. Ecuación piezoeléctrica directa. (Fuente: [28])

En la ecuación 1.5, bajo un esfuerzo aplicado, se genera un desplazamiento eléctrico.

 $S = s^{E}T + dE$ Ecuación 1.6. Ecuación piezoeléctrica inversa. (Fuente: [28])

La ecuación 1.6, representa que, al aplicarse un campo eléctrico, se produce una deformación del material. D es la densidad de flujo eléctrico por unidad de área en forma vectorial. d es la constante piezoeléctrica que relaciona la parte eléctrica con la mecánica; E la permitividad, e^T representa el desplazamiento eléctrico cuando las tensiones permanecen constantes; s^E es la constante que representa la interacción de una deformación y una tensión con la condición de campo constante, S deformación y T es el esfuerzo, estas dos últimas como magnitudes tensoras. Las constantes tienen la naturaleza de derivadas parciales.

Sensor piezoeléctrico PVDF (Fluoruro de polivinilideno)

Es un tipo de sensor piezoeléctrico, el cual está compuesto en su gran mayoría por fluoruro de polivinilideno. Generalmente cuando se adquiere este tipo de sensor, viene con la curva de calibración cuasi estática, que tiene un 98% de precisión y entrega los valores en unidades de carga por unidad de área, por lo que en la salida se requiere contar con un acondicionador de señal o convertidor de carga. De acuerdo con estudios realizados por la fuerza naval estadounidense [29], se comprobó que en agua se pueden obtener resultados de esfuerzos máximos mediante el uso de sensores PVDF [30]. Las principales características de los sensores PVDF son su baja densidad y buena sensibilidad, además de ser resistente mecánicamente.



Figura 1.13. Ilustración de una galga PVDF. (Fuente: [26])

1.5.2. Sensores piezoresistivos

Son elementos pasivos, los cuales transforman una deformación elástica en un cambio de resistencia proporcional a la deformación.

Para convertir la resistencia en voltaje absoluto se utiliza el puente de Wheatstone, siempre y cuando la deformación cumpla la ley de Hooke. El factor que relaciona la deformación con el voltaje absoluto es el factor de galga.



Figura 1.14. Sensor piezoresisitivo. (Fuente: [31]).

Sensor piezoresistivo de manganina

El sensor está compuesto por una aleación de 82-86% de cobre, 12-15% de manganeso y 2-4% de níquel. Entre sus ventajas está en que presenta una alta sensibilidad a presiones hidrostáticas, generando una resistencia lineal para presiones extremadamente altas.



Figura 1.15. Sensor piezoeléctrico de manganina. (Fuente: [26])

2. METODOLOGÍA

En este capítulo se describirá el estudio numérico para la toma de datos de impacto, la manera de medir las presiones de impacto y el ambiente de simulación desarrollado. El estudio numérico se realizó en paraview y la simulación se la hizo utilizando Matlab. El diagrama de bloques de la medición es el mostrado en la Figura 2.1.



(Fuente: Propia)

2.1. Presiones en el sistema

2.1.1. Antecedentes

Se parte de los resultados del trabajo doctoral "Numerical study on unsteady cavitating Flow and erosion on homogeneous mixture assumption" [1], en la que presentó un nuevo modelo de erosión por cavitación basado en la energía liberada durante el colapso. Mediante este modelo, se puede evaluar la agresividad del flujo, la región total afectada y el material deformado, además se basa en la hipótesis de flujo homogéneo de la mezcla y en la transformación de la energía potencial y cinética entre el inicio y el final del colapso. Para la validación del modelo de erosión por cavitación, Hidalgo [1] comparó el resultado de la simulación con los trabajos experimentales llevados a cabo en la Polytechnique Fédérale de Lausanne (EFPL) por Escaler et al. [5], en su trabajo "Cavitation erosion tests on a 2D hydrofoil using Surface-mounted obstacles" en la cual colocó un ala hidrodinámica convexa con obstáculo semicircular en un túnel generador de cavitación y lo sometió a las mismas condiciones iniciales de ángulo de ataque (α), velocidad de número de cavitación (σ). Se debe recalcar que el obstáculo es usado para generar una alteración en el flujo con el fin de incrementar la agresividad mediante la generación de vórtices de cavitación. Los resultados de validación [1], mostraron regiones similares afectadas por el flujo agresivo y además mejores que las obtenidas por Peters et al. [18] y Li [32].



Del estudio realizado en [1], se tomaron los parámetros α_o (fracción de volumen inicial), α_f (fracción de volumen final) y P (cambio de presión).

Utilizando las ecuaciones de velocidad de impacto del jet (Ecuación 1.3) y de presión de impacto del jet (Ecuación 1.4), se determina estos parámetros. Como lo describe la Figura 2.3.



Para usar los datos de fracción de volumen inicial, volumen final y de cambio de presión; se utiliza el software Paraview. Además de visualización, en paraview se puede aplicar las fórmulas de velocidad y presión de impacto del jet para la obtención de la zona más afectada mediante la suma de las presiones de impacto.

2.1.2. Descripción de Paraview

Paraview es una aplicación de código abierto que permite la visualización y análisis científico de conjuntos de datos de gran tamaño tanto en 2D como en 3D; puede procesar un conjunto muy grande de datos en paralelo y después permite su recopilación. Está construida sobre la herramienta de visualización VTK (Visualization Toolkit), por lo que puede ser extendida, configurada y renderizada. Proporciona muchos algoritmos de visualización de propósito general, así como algunos algoritmos específicos de las disciplinas científicas en particular y además permite la aplicación de algoritmos de visualización personalizada. Para la visualización lo que realiza el programa es tomar un conjunto de datos sin procesar y convertirlos en una forma que sea visible y comprensible para los seres humanos. Diseñado para que todas sus componentes puedan ser reutilizados para desarrollar rápidamente aplicaciones vectoriales, ayudando a que tenga funcionalidad específica para un problema en específico. Para poder visualizar se tiene 3 pasos básicos [33], [34]:

- Leer; los datos pueden provenir de las mallas de simulación o de datos de escáner para la visualización científica.
- Filtrar; se pude aplicar lectores que procesen los datos para generar, extraer o derivar características de los datos.
- Representación; generalmente se muestran en tridimensional, por lo que los datos primarios usados en la aplicación son de mallas.

2.1.3. Funciones de Paraview usadas

Las funciones en Paraview también conocidas como filtros, son unidades que permiten procesar los datos para generar, extraer o derivar características de los datos. Los filtros se juntan a fuentes, lectores u otro tipo de filtros para modificar sus datos. Los que se usaron para la extracción y posterior procesamiento de los datos están [33], [34]:

Calculadora: Genera una nueva matriz de datos o una nueva coordenada de puntos como función de matrices de entrada existente. Funciona al igual que una calculadora científica evaluando una expresión por puntos o por celdas. Se la usa para ingresar la Ecuación 1.3 y Ecuación 1.4 que corresponden a la velocidad y presión de impacto del jet.

Clip: Permite eliminar la geometría de un lado del plano definido por el usuario, mediante la intersección con un medio espacio. Por lo que facilita la extracción de datos del sistema analizado mediante la eliminación de una parte de la geometría, además de permitir una mejor visualización.

Find data: Permite seleccionar y extraer datos en una determinada región de la simulación para analizarla.

Plot Selection Over Time: Permite el trazado de atributos en el tiempo de los elementos seleccionados. Mediante esta función es posible construir la Figura 2.6. Temporal Statistic: Permite obtener el valor máximo, valor mínimo y promedio de la simulación total.

2.1.4. Descripción del ala y condiciones iniciales

Para el presente proyecto se utiliza un ala convexa con obstáculo semicilíndrico. El ala hidrodinámica convexa tiene una longitud de cuerda de 91,1[mm], su ancho es de 27,33[mm], presenta un borde delantero semicircular y un borde de salida puntiagudo como se muestra en Figura 2.4 [1].



Sobre el ala convexa se monta un obstáculo semicircular, que tiene como finalidad inducir severa erosión localizada sobre la superficie del ala, produciendo una importante pérdida de masa de material en un periodo relativamente corto. La erosión es generada por los fuertes vórtices de cavitación. Además, el método de vórtice de cavitación permite clasificar a los materiales de acuerdo con su resistencia a la erosión [5].



⁽Fuente: [1]).

El material del ala convexa es de acero inoxidable de la serie X5 Cr Ni 13.4 y tiene las propiedades mecánicas mostrada en la Tabla 2.1 [5].

Acero inoxidable X5 Cr Ni 13,4			
Parámetros	Símbolo	Valor	Unidades
Densidad	ρ_{m}	13900	kg/m ³
Módulo de Young	Е	220	MPa
Resistencia a la tracción	σ_{r}	780	N/mm ²
Dureza	-	220	HV

Tabla 2.1. Propiedades mecánicas del acero inoxidable X5 Cr Ni 13,4 [5].

(Fuente: [5])

Las condiciones iniciales de velocidad de flujo de entrada (U_{∞}), número de cavitación (σ), ángulo de incidencia (\widehat{AoB}) son necesarias controlar para asegurar las condiciones de flujo constante debido a que sus valores influyen en el cálculo de la presión de impacto del jet [35].

Los parámetros antes mencionados y otros parámetros que ayudarán a determinar las especificaciones de construcción y de operación que debe tener el dispositivo de medición se muestran en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2. Valiables y condiciones del medio.				
Parámetros	Símbolo	Valor	Unidades	
Velocidad de Flujo	U_{∞}	35	m/s	
Número de cavitación	σ	1		
Ángulo de ataque	AoB	3	Grados	
Presión inicial	Po	613,6	КРа	
Presión máxima del jet	Pmax	0,376449	GPa	
Frecuencia de impacto	f	$1x10^{4}$	kHz	
Temperatura de trabajo	To	20	°C	
Área analizada	Ă	1245	mm ²	

Tabla 2.2. Variables y condiciones del medio

(Fuente: Propia)

2.1.5. Zonas de presión máxima

Mediante la aplicación de las funciones de Paraview descritas en el punto anterior, se obtiene la gráfica de presión vs. tiempo de los impactos producidos por las implosiones sobre toda la superficie del ala hidrodinámica, como se muestra en la Figura 2.6. Mediante esta gráfica se puede identificar el tiempo de simulación, zona y valor de la presión de la implosión en la que se producen los mayores valores de impacto. Dando que la zona donde se debe colocar los sensores son los mostrados en la Figura 2.8.



Además, mediante la función del software Paraview "Temporal statistic" se obtienen los datos de presión de impacto máxima sobre las regiones del ala como se muestra Figura 2.7. Al dejar solamente los 5 valores máximos de presión se obtiene la Figura 2.8, determinando que se requiere colocar por lo menos cuatro sensores, dos por cada lado.



Figura 2.8. Zona de presiones máximas. (Fuente: Propia)

2.1.6. Tamaño del sensor

Para determinar el tamaño del sensor se considera que, cuando ocurre el colapso de las burbujas de varios tamaños, los impactos no inciden necesariamente en el centro del transductor como se muestra en la Figura 2.9.



Momma et al. [22] y Soyoma et al. [36] investigaron el efecto que causa el tamaño del tamaño del transductor en la que se determina que si el tamaño del transductor no es lo suficientemente grande en comparación al tamaño de las cavidades, las lecturas pueden ser erróneas [36]. Definiendo que para transductores con áreas por debajo de 25mm^2 , se tiene lecturas engañosas (efecto borde) [36]. A medida que aumenta el área del transductor, el valor del impacto se independiza de su área como se muestra en la Figura 2.10 [22].



Figura 2.10. Variación del valor del impacto con el tamaño del transductor. (Fuente: [36])
2.2. Sensores

Para la selección del sensor, se requiere determinar la posición de impacto y la magnitud de presión asociada a dichos microjets. Por lo que los sensores estudiados se centran en la medición directa de impactos de alta magnitud de presión y su localización. De acuerdo al análisis previo se tiene que los sensores que se pueden utilizar deben ser piezoeléctricos o galgas extensiométricas [37].

Por las presiones que se manejarán, que serán presiones dinámicas de $1,12 \times 10^{6}$ [Pa] en un área de 40[mm²], se determina que los sensores a utilizar deben tener las características mínimas indicadas en la Tabla 2.3.

l abla 2.3. Características mínimas de los sensores.					
Parámetro	Símbolo	Valor	Unidades		
Presión inicial	Po	613,6	kPa		
Presión máxima del jet	P _{max}	1,12	GPa		
Frecuencia de impacto	f	$1x10^{4}$	kHz		
Temperatura de trabajo	To	20	°C		
Área mínima	A _{si}	> 25	mm ²		
Cantidad de sensores	Ν	≥ 2			

Table 2.2. Característicos mínimos de la

(Fuente: Propia)

El fabricante que ofrecen los sensores con las medidas adecuadas y que dan mejor información de los sensores es Dynasen Inc [26].

Con las especificaciones de la Tabla 2.3, se tiene que los sensores que pueden ser utilizados son los sensores piezoeléctricos PVDF o piezoresistivo de manganina del fabricante Dynasen [26], cuyas características son las mostradas en la Tabla 2.4.

l abla 2.4. Características de sensores analizados.				
Parámetro	Símbolo	PVDF	Galga resistiva	Unidades
Área del sensor	As	40,32	40,32	mm ²
Frecuencia del sensor	f _s	2		GHz
Rango de presión	R _p	0,01-10	0,5-10	GPa
Temperatura de trabajo	To	20	20	°C

Table 0.4. Consisteriations de a

(Fuente: [26])

2.2.1. Número de sensores y ubicación

De acuerdo con el tamaño y zonas de presión máxima, se determina que el número de sensores a colocarse en el ala es de cuatro, dos por cada zona. La ubicación en el ala es el mostrado en la Figura 2.11.



Figura 2.11. Zonas de ubicación del sensor. Medidas en mm y se cumple el criterio espejo. (Fuente: Propia)

2.2.2. Recubrimiento de un sensor

El sensor no puede estar en contacto directo con el agua, por lo que se requiere colocar un recubrimiento que proteja y no cause distorsiones en las medidas. De acuerdo con estudios de Hujer et al.[25], y Piezotech [38] el área activa del sensor debe ser colocado sobre una superficie plana. Los materiales que van a estar en contacto con el o los sensores, no deben ser conductores ni polares. Por lo que, para acoplar y proteger al sensor, se recomienda utilizar pegamento de epoxi o del cyano-acrilato, las cuales son no polares y su impedancia mecánica es similar al del PVDF, bajo alta presión para reducir el espesor del pegamento. Además Momma et al.[22], determinó que al aplicar cinta de poliamida como capa de protección, no afecta en gran medida las lecturas de impacto como se muestra en la Figura 2.12 porque la frecuencia natural de la cita y del sensor son de 9.4[MHz] y 10[MHz] respectivamente, pero si es necesario realizar la calibración del sensor [22]. Cada capa de poliamida debe tener un espesor de 70 μm .



Figura 2.12. Efecto de las cintas de protección en la distribución de los pulsos. (Fuente: [36])

2.3. Simulación del sensor

Una vez escogidos los sensores a utilizar se procede a simular su operación. Se simula su salida en base a la presión de entrada dinámica que medirán. La simulación incluye una etapa de calibración para que la respuesta de los sensores sea de acuerdo con la curva dada por el fabricante, como se indica en la Figura 2.13.



Figura 2.13. Diagrama de flujo de simulación de los sensores. (Fuente: Propia)

Al sensor ingresan valores de esfuerzo producido en el material debido al colapso de la burbuja. Los valores de esfuerzo son transformados en valores de carga o resistencia dependiendo de cada sensor. Los valores de resistencia o de carga deben ser acondicionados para que ingresen a una tarjeta de adquisición de datos y posteriormente a un computador.

2.3.1. Sensor piezoeléctrico PVDF

Para la simulación del sensor se utiliza la curva de calibración, la cual relaciona la señal de entrada del sensor y su correspondiente señal generada. Para obtener la curva de calibración de un sensor, el fabricante aplica una serie de entradas físicas conocidas y almacena la respuesta de salida para después obtener la curva que mejor se acerca a los valores obtenidos [39]. Para definir una curva de calibración debe

considerarse los siguientes parámetros: Campo de medida, sensibilidad, resolución, histéresis, exactitud, precisión, etc. [39].

La curva de calibración del sensor mostrada en el ANEXO I. es definida mediante la Ecuación 2.1. Curva de calibración del sensor PVDF modelo PVF21-.25-EK.

 $\sigma_{es} = 5.8 \left(\frac{Q}{A}\right) + 3.8 \left(\frac{Q}{A}\right)^{1.6} + 0.55 \left(\frac{Q}{A}\right)^{3.5}$ Ecuación 2.1. Curva de calibración del sensor PVDF modelo PVF21-.25-EK. (Fuente: [26])

Para encontrar de forma aproximada las raíces de una función real. Se utiliza el método de Newton-Raphson para determinar la carga (Q) de la Ecuación 2.1. El diagrama de flujo que sigue el método de Newton-Raphson es el mostrado en la Figura 2.14.



Zona 1

Al usar el sensor en la zona 1 y simular se tiene como datos de salida los mostrados en la Figura 2.15 y sus valores más representativos en la Tabla 2.5.



La presión generada por la implosión de la burbuja genera que se forme un esfuerzo de igual magnitud, el cual al ser registrado por el sensor produce una carga equivalente como se muestra en la Figura 2.15.

rabia 2.5. Valores generados por el serisor 1.				
Descripción	Símbolo	Magnitud	Unidades	
Carga máxima de salida	$Q_{\text{max,1}}$	4,3232x10 ⁻⁷	С	
Carga mínima de salida	$Q_{\min,1}$	4,2208x10 ⁻¹⁰	С	
Esfuerzo máximo	σ _{es.max,1}	1,12	GPa	
Esfuerzo mínimo	$\sigma_{es.min,1}$	613,6	kPa	
Tiempo de respuesta	t _{res}	10	ns	
Carga mínima de salida Esfuerzo máximo Esfuerzo mínimo Tiempo de respuesta	Q _{min,1} σ _{es.max,1} σ _{es.min,1} t _{res}	4,2208x10 ⁻¹⁰ 1,12 613,6 10	C GPa kPa ns	

Tabla 2.5. Valores generados por el sensor 1.

(Fuente: Propia)

Zona 2

Al usar el sensor en la zona 2 y simular se tiene como datos de salida los mostrados en la Figura 2.16 y sus datos más representativos los mostrados en la Tabla 2.6. [26]



Debido a la presión generada por la implosión de un grupo de burbujas, se tiene que el sensor 2 genera una carga equivalente como la mostrada en la Figura 2.16, además se tiene que existe un solo valor representativo.

Descripción	Símbolo	Magnitud	Unidades
Carga máxima de salida	Q _{max,2}	3,672x10 ⁻⁷	С
Carga mínima de salida	$Q_{\min,2}$	4,2651x10 ⁻¹³	С
Esfuerzo máximo	σ _{es.max,2}	0,895	GPa
Esfuerzo mínimo	σ _{es.min,2}	613,6	kPa
Tiempo de respuesta	t _{res}	10	ns

Tabla 2.6 Valores generados por el sensor 2

(Fuente: Propia)

2.3.2. Sensor piezoresistivo de manganina

El modelo de sensor piezoresistivo que se analizará es Mn8-50-EK-25, cuyo proveedor es Dynasen Inc. Este tipo de sensor tiene una resistencia interna de $50[\Omega]$. Las características del sensor se muestran en la Tabla 2.7 [26].

Descripción	Símbolo	Magnitud	Unidades
Área del sensor	A _s	6,35 <i>x</i> 6,35	mm ²
Espesor de la lámina	es	0,001	pulg
Presión máxima	P _{max}	10	GPa
Presión mínima	P _{min}	0,5	GPa
Resistencia interna	Ro	50	Ω
Resistencia del pin de soldadura	R _{cu}	0,3	Ω
Tiempo de respuesta	t _{res}	~10	ns

(Fuente: [26])

La curva característica del sensor piezoresistivo modelo Mn8-50-EK-25 se muestra en el ANEXO II. y se define mediante la Ecuación 2.2.



Zona 1

Al usar la curva de calibración del sensor piezoresistivo de manganina, se tiene el cambio de resistencia mostrada en la Figura 2.17 y sus valores más representativos en la Tabla 2.8.



Al utilizarse el sensor de manganina se tiene que la implosión de las burbujas generar una resistencia equivalente a las mostradas en la Figura 2.17.

Tabla 2.8. Valores generados por el sensor piezoresistivo 1.				
Descripción	Símbolo	Magnitud	Unidades	
Resistencia máxima de salida	R _{max,1}	139,605	Ω	
Resistencia mínima de salida	R _{min,1}	0	Ω	
Esfuerzo máximo	$\sigma_{es.max,1}$	1,12	GPa	
Esfuerzo mínimo	$\sigma_{es.min,1}$	613,6	kPa	
Tiempo de respuesta	t _{res}	10	ns	

(Fuente: Propia)

Zona 2

Al usar la curva de calibración del sensor piezoresistivo de manganina, se tiene el cambio de resistencia mostrada en la Figura 2.18 y sus valores más representativos en la Tabla 2.9.



(Fuente: Propia).

Tabla 2.9	Valores	generados	nor el	sensor	niezores	sistivo (2
1 abia 2.3	values	yenerauos.		361301			_

Descripción	Símbolo	Magnitud	Unidades
Resistencia máxima de salida	R _{max,1}	1,119x10 ²	Ω
Resistencia mínima de salida	R _{min,1}	0	Ω
Esfuerzo máximo	$\sigma_{es.max,1}$	0,895	GPa
Esfuerzo mínimo	σ _{es.min,1}	613,6	kPa
Tiempo de respuesta	t _{res}	10	ns

(Fuente: Propia)

2.4. Acondicionamiento de los sensores

La finalidad del acondicionador es generar una señal que sea aceptable por el dispositivo que se conectara a continuación. En este caso se acondicionará la señal para que entre a un sistema de adquisición de datos y posteriormente a un computador.

2.4.1. Sensor piezoeléctrico PVDF

Como el sensor PVDF se comporta como una fuente de carga [40], para su acondicionamiento se puede usar un acondicionador de carga, o se puede transformar

la carga a corriente mediante una resistencia conectada a su terminales. Lynch et. al. [40], recomienda realizar el acondicionamiento por carga.



(Fuente: Propia)

Un integrador de carga permite transformar la señal de salida de carga eléctrica de alta impedancia proveniente del sensor en una salida de tensión eléctrica proporcional y de baja impedancia [41], [42].

Además, los amplificadores de carga presentan mejores características para contrarrestar el ruido eléctrico de banda ancha, generado por la polarización inducida por el choque de agua sobre el transductor, que en ocasiones dificulta la calibración y distorsiona la señal que se transmite a los instrumentos de medición [43].

El circuito característico de un amplificador de carga ideal es el mostrado en la Figura 2.20 y considerando las capacitancias parásitas debido a la longitud de los cables se tiene el circuito mostrado en la Figura 2.21. Se debe asegurar que el valor de la capacitancia parásita de los cables sea menor a 10[ns], ya que esto afecta a la constante de tiempo [40].



(Fuente: [31])

Como voltaje de salida de un amplificador de carga se tiene la Ecuación 2.3.

$$V_{out} = -V_f = \frac{q_{in}}{C_f}$$

Ecuación 2.3. Voltaje de salida de un amplificador de carga.

Las características del acondicionador de carga son las indicadas en la Tabla 2.10.

Tabla 2.10. Características de los elementos de acondicionamiento.

Parámetros	Símbolo	Valor	Unidades
Capacitancia del transductor	С	100	Pf
Capacitancia del amplificador	C ₂	10	GPa
Tiempo de respuesta	t _{res}	~10	ns
Resistencia del amplificador	R	50	Ω

(Fuente: Propia)

Como integrador de carga se selecciona el modelo CI-50-01, porque puede ser usado para acondicionar medidas de presión altas y además cuenta con las características mostradas en la Tabla 2.11 [30], que cumplen lo que se necesita.



Figura 2.22. Integrador de carga modelo CI-50-0.1. (Fuente: [30])

Tabla 2.11. Características del integrador de carga modelo CI-50-0

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidades
Capacitancia del amplificador	C ₂	0,1	μF
Rango de presión	Rp	0 - 30	GPa
Resistencia del amplificador	R	50	Ω
Tiempo de respuesta	t _{res}	~20	ns

(Fuente:[26])

Al acondicionar la señal de salida del sensor 1, se tiene la gráfica de Voltaje vs. Tiempo que se muestra en la Figura 2.23. Esta señal transformada a voltaje puede ser ingresada a la tarjeta de adquisición de datos.



Al acondicionar la señal de salida del sensor 2, se tiene la gráfica de Voltaje vs. Tiempo que se muestra en la Figura 2.24



2.4.2. Sensor piezoresistivo de manganina

Las diferencias de presión son registradas con un cambio en la resistencia, por lo que se requiere un cambio a voltaje para que pueda ser ingresada al sistema de adquisición de datos. El proceso que sigue el acondicionamiento del sensor de manganina es el mostrado en la Figura 2.25.



Figura 2.25. Acondicionamiento sensor piezoresistivo de manganina. (Fuente: Propia).

Para transformar de cambios de resistencia a cambios de voltaje, se utiliza una fuente de pulsos. El proveedor de los sensores que se analizan en el presente proyecto recomienda utilizar una fuente de pulsos piezoresistiva CK2-50.



Figura 2.26. Fuente de pulsos piezoresistiva CK2-50. (Fuente: [26])

La fuente de pulsos está compuesta de un arreglo de un puente de Wheatstone, por lo tanto, el voltaje de salida se puede obtener mediante la Ecuación 2.4.



Figura 2.27. Puente del circuito utilizado en la fuente de pulsos. (Fuente: [44]).

$$V_{b} = \frac{E \cdot R_{3}}{R_{3} + R_{0} + \Delta R}$$
$$V_{a} = \frac{E \cdot R_{3}}{R_{3} + R_{2}}$$

$$V_{ab} = V_a - V_b = E \cdot R_3 \left(\frac{1}{R_3 + R_2} - \frac{1}{R_3 + R_0 + \Delta R} \right)$$

Ecuación 2.4. Ecuación de acondicionamiento del sensor piezoresistivo. (Fuente: [44]).



Tabla 2.12 Valores de	voltaie generados por e	l puente en el sensor 1.

Descripción	Símbolo	Magnitud	Unidades
Voltaje máximo de salida	V _{max,1}	4,8065	V
Voltaje mínimo de salida	V _{min,1}	0,005336	V

(Fuente: Propia)



(Fuente: Propia)

Tabla 2.13. Valores de voltaje generados por el puente en el sensor 2.							
Descripción	Símbolo	Magnitud	Unidades				
Voltaje máximo de salida	V _{max,2}	4,2832	V				
Voltaje mínimo de salida	$V_{\min,2}$	0,005336	V				

(Fuente: Propia)

2.5. Tarjeta de adquisición de datos

Una tarjeta de adquisición de datos posibilita capturar y/o generar señales reales e interactuar con ellas mediante un ordenador u otros dispositivos electrónicos como se muestra en la Figura 2.30. Su función es convertir señales analógicas provenientes del mundo real a señales digitales, o viceversa [45], [46], [47].

Una tarjeta de adquisición de datos tiene las siguientes características:

- Número de canales analógicos; indica la cantidad de magnitudes diferentes que se puede adquirir con la misma tarjeta.
- Velocidad de muestreo: mejora la representación analógica y siempre es mayor que el doble de la frecuencia de la señal que queremos muestrear.
- Resolución; viene dada por el número de bits de la conversión analógico-digital.
- Rango de entrada; indica los valores entre los que debe estar la señal de entrada para que pueda ser procesada.
- Capacidad de temporización; permite controlar los momentos en los que se debe leer una señal e identifica cuantas veces se ha producido un evento.
- Forma de comunicarse con el computador; puede realizar de dos formas: mediante entrada-salida por interrupción o mediante el acceso directo a memoria, en este ultimo los que el flujo de datos puede ser elevados. [47]



(Fuente: [46])

Para la adquisición de datos se recomienda utilizar la tarjeta MF 634, la cual es compatible con la Extended Real Time Toolbox para MATLAB. La tarjeta de adquisición multifución tiene las siguientes características:

- Entradas analógicas unipolares de 14 bits.
- Salidas analógicas de 14 bits.
- Entradas y salidas digitales.
- Contadores y temporizadores.

- Drive para Real-Time Windows Target y para xPC Target.
- Rango de entrada: ±10 [V]
- Impedancia de entrada: $10^{10} [\Omega]$



Figura 2.31. Tarjeta de adquisición de datos MF 634. (Fuente: [48])

2.6. Ambiente de simulación

La simulación del sistema se hizo usando MATLAB por su facilidad de procesamiento de datos. En la Figura 2.32, se muestra la primera pantalla la cual es la pantalla de presentación del programa para la adquisición de datos de impacto.



Figura 2.32. Pantalla principal del visualizador. (Fuente: Propia)

La Figura 2.33, corresponde al Menú Principal. Mediante las opciones de la pantalla se puede acceder a la simulación del sensor piezoeléctrico, sensor de manganina, información acerca del fenómeno de cavitación y uso del programa.



(Fuente: Propia)

En la Figura 2.34, se muestra la pantalla de conexiones. A partir de cada una de estas opciones se puede acceder a la pantalla de gráficas de simulación y obtener más información de cada uno de los elementos que se utilizan en la adquisición de datos.



(Fuente: Propia)

La Figura 2.35, indica las gráficas de simulación. Esta pantalla da opciones de eliminar datos impacto, seleccionar puntos de la simulación, realizar un aumento de zonas que se desea analizar, entre otros comandos.



Figura 2.35. Visualizador de gráficas. (Fuente: Propia)

La Figura 2.36 presenta la pantalla "Más información" en la cual se da más detalles de cómo se produce el proceso de cavitación, los tipos de cavitación que existen y los principales daños causados por este fenómeno.



Figura 2.36. Pantalla de "Más información". (Fuente: Propia)

2.7. Evolución del área afectada

Al variar parámetros como la velocidad del flujo de entrada (U_{∞}), ángulo de incidencia (\widehat{AoB}) y número de cavitación (σ); se provoca el cambio en el tamaño de la nube de cavitación y en el área afectada por la cavitación [1].

Para las condiciones usadas, se tiene que la evolución y la acumulación de región afectada por cavitación se presentan de la forma mostrada en la Figura 2.37 y Figura 2.38, respectivamente.



0.000e+00 9.4e+7 1.9e+8 2.8e+8 3.758e+08







Aplicando la razón de crecimiento de la burbuja cuando se encuentra sin obstáculo y trasponerlo en la región afectada por erosión, se tiene que el crecimiento es el mostrado en Figura 2.39 y las condiciones de operación en la Tabla 2.14.



Figura 2.39. Evolución de la cavitación y del área de impacto. Valores de long. en mm. (Fuente: Propia)

		SIN	OBSTAC	ULO			CON OBSTACULO				
	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5	UNIDADES
σ	1	0,7	0,7	0,7	1,12	1	0,7	0,7	0,7	1,12	
ÂoB	3	2,3	3	3	3	3	2,3	3	3	3	0
U∞	35	35	25	35	35	35	35	25	35	35	m/s
₽∞	613,58	430,19	220,6	430,19	680,82	613,58	430,19	220,6	430,19	680,82	kPa
Long. Crecimiento	15,04	56,19	52,35	48,76	11,97	26,59	99,3412	92,5523	86,2053	21,1624	mm
Razón incremento	1,000	3,736	3,481	3,242	0,796	1,000	3,736	3,481	3,242	0,796	

Tabla 2.14. Condiciones de operación y evolución de la cavidad.

(Fuente: Propia)

2.8. Análisis de costos

A continuación, se presenta los costos referenciales de la instalación del sistema para la obtención de datos de impacto usando el sensor PVDF y sensor piezorresistivo.

Tabla 2.15. Costos de referencia para la obtención de datos de impacto al usar un sensor PVDF.

ELEMENTO	MODELO	CANTIDAD	PRECIO c/u	PRECIO TOTAL
Sensor PVDF	PVF21125-EK	4	170,4	681,6
Amplificador de carga	CI-50-0.1	4	600	2400
Tarjeta de adquisición de datos	NI PCLe-6320	1	640	640
Cables de conexión BCN - Pig tail	CA-1147-5	4	21,1	84,4
Recubrimiento	Epoxi Eastman 910	2	18,82	37,64
Otros		1	20	20
			Total	3863,64

(Fuente: Propia)

Tabla 2.16. Costos de referencia para la obtención de datos de impacto al usar un sensor piezoresistivo.

ELEMENTO	MODELO	CANTIDAD	PRECIO c/u	PRECIO TOTAL
Sensor piezoresistivo Manganin 50 [ohm]	Mn8-50-EK-25	4	126,3	505,2
Fuente de pulsos	CK2-50/0,050-300	1	8340	8340
Tarjeta de adquisición de datos	NI PCLe-6320	1	640	640
Cables de conexión BCN - Pig tail	CA-1147-5	4	21,1	84,4
Cables de conexión BCN - BCN	CA-1147-7	2	29,05	58,1
Recubrimiento	Epoxi Eastman 910	2	18,82	37,64
Otros		1	20	20
			Total	9685,34

(Fuente: Propia)

2.9. Evaluación y selección de la mejor alternativa

Considerando el uso del sensor PVDF y del sensor piezoresistivo de manganina con sus respectivos elementos de acople recomendados por el fabricante, es necesario realizar una evaluación de estas que nos permita determinar la solución más idónea para la medición. Por ellos se utiliza el método ordinal corregido de criterios ponderados [49].

Esta forma de evaluación permite decidir entre diversas alterativas, con solo tener el orden de preferencia de la evaluación global. Se fundamenta con tablas, donde cada criterio se examina con los restantes criterios y se le asigna valores, donde: el valor 1 se da si el criterio es de mayor importancia que el otro, de 0.5 si dos criterios tienen valores iguales de importancia y de 0 si el criterio es de menor importancia que el otro criterio evaluado [49].

Criterios de valoración:

- Fiabilidad; para evitar que cualquier fallo, provoque un contratiempo apreciable o que los valores medidos sean erróneos.
- Costo; es una limitación por el valor de los sensores y a la cantidad que se requieren en cada prueba.
- Tamaño; debido a que tanto el tamaño del ala hidrodinámica como del equipo para ensayarlo es limitado.
- Rango de funcionamiento; debe ser alto debido a que al variar en poca cantidad el ángulo, me crea impactos mayores, originando un daño rápido del sensor.
- Velocidad de respuesta; debe ser capaz de responder al cambio en el valor de impacto, en un tiempo mínimo.

Se tiene como alternativas:

- **Solución A:** Sensor PVDF y elementos de acople.
- **Solución B:** Sensor piezoresistivo y elementos de acople.

Fiabilidad > Velocidad de respuesta > Rango de funcionamiento > Tamaño = Costo									
Criterios	Fiabilidad	Velocidad	Rango	Tamaño	Costo	Σ+1	Ponderado		
Fiabilidad		1	1	1	1	5	0,33		
Velocidad	0		1	1	1	4	0,27		
Rango	0	0		1	1	3	0,2		
Tamaño	0	0	0		0,5	1,5	0,1		
Costo	0	0	0	0,5		1,5	0,1		
					SUMA	15	1		

Tabla 2.17. Evaluación del peso específico de cada criterio.

(Fuente: Propia)

Tabla 2.18. Evaluación del peso específico del criterio fiabilidad.

Solución A > Solución B									
FIABILIDAD	Solución A	Solución B	Σ+1	Ponderado					
Solución A		1	2	0,67					
Solución B	0		1	0,33					
		SUMA	3	1					

(Fuente: Propia)

Tabla 2.19. Evaluación del peso específico del criterio velocidad de respuesta.

Solución A = Solución B									
VELOCIDAD	Solución A	Solución B	Σ+1	Ponderado					
Solución A		0,5	1,5	0,5					
Solución B	0,5		1,5	0,5					
		SUMA	3	1					

(Fuente: Propia)

Tabla 2.20. Evaluación del peso específico del criterio rango.

Solución A > Solución B									
RANGO	Solución A	Solución B	Σ+1	Ponderado					
Solución A		1	2	0,67					
Solución B	0		1 0,3	0,33					
		SUMA	3	1					

(Fuente: Propia)

Tabla 2.21. Evaluación del peso específico del criterio tamaño.

Solution $A = Solution B$								
TAMAÑO	Solución A	Solución B	Σ+1	Ponderado				
Solución A		0,5	1,5	0,5				
Solución B	0,5		1,5	0,5				
		SUMA	3	1				

(Fuente: Propia)

Tabla 2.22. Evaluación del peso específico del criterio costo. Solución A > Solución B

COSTO	Solución A	Solución B	Σ+1	Ponderado					
Solución A		1	2	0,67					
Solución B	0		1	0,33					
		SUMA	3	1					

(Fuente: Propia)

Tabla 2.23. Tabla de conclusiones.

CONCLUSION	Fiabilidad	Velocidad	Rango	Tamaño	Costo	Σ	Prioridad
Solución A	0,222	0,133	0,133	0,05	0,067	0,606	1
Solución B	0,111	0,133	0,067	0,05	0,033	0,394	2

(Fuente: Propia)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos y su respectivo análisis se muestran a continuación.

3.1. Graficas usando sensores PVDF

En la Figura 3.1, se muestra la gráfica de Presión vs. Tiempo de los datos obtenidos del estudio numérico usando el modelo de erosión por cavitación propuesto por Hidalgo [1] y la gráfica obtenida después de haber sido captada por los sensores PVDF.



Figura 3.1. Gráficas de Presión vs. Tiempo de los datos del estudio numérico y los datos de salida de los sensores PVDF. (Fuente: Propia).

Para el sensor 1, se observa que para tiempos menores a $1,6x10^{-2}[s]$ no se tiene impactos de presión considerables, el valor de presión es el mínimo.

Además, puede observar que al tiempo $1,66x10^{-2}$ [s] se tiene la mayor presión la que equivale a $2,02x10^{7}$ [Pa], tanto para el valor obtenido utilizando el estudio numérico como la simulación realizada después de ser captada mediante el sensor.

Para el segundo valor máximo se tiene en el tiempo $1,713x10^{-2}[s]$ con un valor de presión de $1,88x10^{7}[Pa]$ para el obtenido mediante el estudio numérico y de $1,874x10^{7}[Pa]$ para el obtenido mediante el sensor como se muestra en Figura 3.2.



Figura 3.2. Gráficas Presión vs. Tiempo del estudio numérico y los datos de salida de los sensores PVDF para el segundo valor de mayor presión. (Fuente: Propia).

Los otros valores de presión, no se consideran por ser pequeños en comparación a los altos valores.

Para el sensor 2, se tiene que para tiempo de simulación menor a $1, 10^{-2}$ [s] no se tiene impactos por implosión de la burbuja.

En el tiempo $1,703 \times 10^{-2}$ [s], se tiene una presión de impacto de $1,632 \times 10^{7}$ [Pa], y es la misma tanto en el estudio numérico como en el sensor.

La diferencia existente entre la gráfica obtenida mediante el estudio numérico y el sensor es debida a que la curva de calibración no tiene una relación lineal con su salida.

3.2. Graficas usando sensores piezoresistivos de manganina

En la Figura 3.3 se muestra la Grafica de Presión vs. Tiempo tanto el estudio numérico como para los datos obtenidos después de los impactos sobre el sensor piezoresisitivo de manganina.

En la zona 1, se observa que el mayor valor de presión se da al tiempo $1,66x10^{-2}[s]$ y de presión un valor de $2,02x10^{7}$ [Pa], como segundo valor alto, se da en el tiempo $1,713x10^{-2}[s]$ con una presión de $1,876x10^{7}$ [Pa] y como tercer valor alto se da en el tiempo $1,708x10^{-2}[s]$ con una presión de $1,725x10^{7}$ [Pa].

En la zona 2, se tiene que el mayor valor de presión se da al tiempo $1,703x10^{-2}[s]$ y tiene una presión de $1,632x10^{7}$ [Pa].

Para todos los valores antes mencionados son iguales para el estudio numérico como para lo obtenido después de la simulación. Ambas graficas coinciden debido a que la curva de calibración característica del sensor es lineal.



(Fuente: Propia)

En la Figura 3.1 y Figura 3.3, se tiene que los valores máximos no sobrepasan el valor de $2,02 \times 10^7$ [Pa], coincidiendo con los resultados obtenidos por Escaler, en la que indica que los impactos más fuertes han sido por debajo de 1200 [N] [5].

3.3. Análisis espectral

El análisis espectral se usa para la descomposición de una señal compleja en bandas de frecuencia más simples para analizar las frecuencias que más nos interesan y determinar si el sensor que se emplea permite captar el fenómeno analizado [50]. Para poder interpretar correctamente el espectro se debe conocer los siguientes puntos [50]:

- Las formas de representación del espectro (unidades de frecuencia, escala de densidad espectral, etc.).
- Conocer la forma de los espectros de ciertos procesos.
- Como afectan los filtros al espectro.

En la Figura 3.4, se muestra el análisis espectral del sensor en la zona 1. La misma que después de eliminarse presiones a partir de un rango, empieza a acentuarse la señal en 1800[Hz]. Las presiones recortadas corresponden a otros fenómenos que no tienen que ver con el proceso de cavitación.



Figura 3.4. Gráficas de Amplitud vs. Tiempo de los datos del estudio numérico y de los datos de salida del sensor 1 PVDF. (Fuente: Propia).

En la Figura 3.5, se muestra el análisis espectral del sensor en la zona 2. La misma que después de aplicarse un filtro pasa-banda se tiene una frecuencia de 8000 [Hz].



Figura 3.5. Gráficas de Amplitud vs. Tiempo de los datos del estudio numérico y de los datos de salida del sensor 2 PVDF. (Fuente: Propia).

3.4. Selección de la mejor alternativa

En la Tabla 2.23 se muestra las conclusiones de aplicar el método ordinal corregido de criterios ponderados [49]. La Solución A, corresponde al uso de sensores piezoeléctricos y la Solución B corresponde al uso de sensores piezoresistivos para captar los valores de impacto de cavitación.

1 auia 2.23. 1 aui		iones.					
CONCLUSION	Fiabilidad	Velocidad	Rango	Tamaño	Costo	Σ	Prioridad
Solución A	0,222	0,133	0,133	0,05	0,067	0,606	1
Solución B	0,111	0,133	0,067	0,05	0,033	0,394	2

Tabla 2.23. Tabla de conclusiones.

(Fuente: Propia)

Aunque mediante simulación; con el sensor piezoresistivo de manganina se consigue obtener valores muy cercanos a los calculados mediante el estudio numérico, al realizar el análisis de la mejor alternativa considerando: la fiabilidad, velocidad de respuesta, rango de trabajo, tamaño y costo; se tiene que el uso de sensores piezoeléctricos PVDF es la mejor alternativa. Además, para un diseño no es necesario conocer valores intermedios de impacto, sino los más valores altos y su ubicación.

3.5. Evolución del área afectada por la cavitación

En la Tabla 3.1, se muestra como es la razón de incremento y la longitud de crecimiento de la nube de cavitación variando el número de cavitación (σ), ángulo de incidencia (\widehat{AoB}), flujo de entrada (U_{∞}) y presión de los alrededores (P_{∞}).

	SIN OBSTACULO					CON OBSTACULO					
	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5	UNIDADES
σ	1	0,7	0,7	0,7	1,12	1	0,7	0,7	0,7	1,12	
AoB	3	2,3	3	3	3	3	2,3	3	3	3	0
U∞	35	35	25	35	35	35	35	25	35	35	m/s
₽∞	613,58	430,19	220,6	430,19	680,82	613,58	430,19	220,6	430,19	680,82	kPa
Long. Crecimiento	15,04	56,19	52,35	48,76	11,97	26,59	99,3412	92,5523	86,2053	21,1624	mm
Razón incremento	1,000	3,736	3,481	3,242	0,796	1,000	3,736	3,481	3,242	0,796	

Tabla 3.1. Condiciones de operación y evolución de la cavidad

(Fuente: Propia)

El mayor incremento de la nube de cavitación se produce cuando se reduce tanto el ángulo de incidencia como el número de cavitación y el menor incremento se produce cuando se aumenta el número de cavitación manteniendo el ángulo de incidencia.

Al observar la Figura 2.39, se tiene que incrementar el área afectada por la cavitación en los cuatro primeros casos, pero además que los valores de presiones de impacto no aumentan.

Al variar los parámetros físicos, aumenta el área afectada por la cavitación. Originando que se cambie el lugar de colocación de los sensores o se aumente el número de sensores.

Al cambiar los parámetros físicos, se tiene un aumento en el área afectada, mas no aumenta la magnitud del jet de impacto producida por la implosión de las cavidades ubicadas a la distancia que generan daño.

3.6. Comparación para validación

3.6.1. Antecedentes

Escaler et al. [5], en el artículo "Cavitation erosion tests on a 2D hydrofoil using Surface-mounted obstacles", presentó un proceso de prueba de erosión por cavitación

utilizando un túnel de cavitación de alta velocidad y un ala hidrodinámica convexa con obstáculo. El obstáculo tiene como propósito el acelerar la acumulación de daño en la superficie del ala hidrodinámica mediante la generación de vórtices de cavitación. Las condiciones de operación hidrodinámica son las mostradas en la Tabla 3.2, y son las mismas que las usadas por Hidalgo[1] para validar su modelo de erosión.

Tabla 3.2. Condiciones de operación experimental.							
Descripción	Símbolo	Magnitud	Unidades				
Velocidad del fluido en la entrada	U∞	35	m/s				
Número de cavitación	σ AoB	1					
Ángulo de ataque	nob	3	grados				

(Fuente: [5])

Para comparar y validar sus resultados, utilizo los resultados obtenidos en un generador de cavitación de vórtice y en un aparato de vibración, los cuales son usados en este tipo de pruebas. Para la prueba utilizó un ala hidrodinámica de acero inoxidable.

3.6.2. Validación

Para la validación de los resultados obtenidos mediante simulación, se compara las gráficas de Área de picadura vs. Fuerza de impacto, tanto de la simulación de los sensores como de los resultados experimentales obtenidos por Escaler[5].

Para determinar el área de picadura, se parte de estudios realizados por Dular et al. [20] en la que señala que una parte de la energia contenida en una cavidad y que luego es liberada en el proceso de cavitación es usada para alcanzar la condición de flujo plástico del material y el resto de la energía es convertida en energía de deformación. Luego Lush [51], determino que la velocidad crítica estimada puede ser usada para obtener la deformación plástica ocasionada por el impacto normal de una porción de líquido sobre un material sólido y puede ser calculada por Ecuación 3.1.

$$\begin{split} \mu_{cri} &= \sqrt{\frac{P_y}{\rho_l}} \bigg(1 - \bigg(1 + \frac{P_y}{B}\bigg)^{-1/n}\bigg) \\ \text{Ecuación 3.1. Velocidad crítica.} \\ & (\text{Fuente: [51]}) \end{split}$$

Donde P_v es el límite de elasticidad del material, B y n son coeficientes estandar relacionados con el líquido, y sus valores son de 300 [MPa] y 7 respectivamente para el agua. [1], [51], [52]. Para determinar el valor de volumen deformado, se tiene la Ecuación 3.2, determinada por Hidalgo [1].

$$V_{def} = \frac{2\alpha_o}{(8,97\cdot\gamma^2)^2} x \left(\frac{U_{jet} - U_{crit}}{U_{jet}}\right) \cdot V$$

$$\label{eq:Vdef} \begin{split} V_{def} &= \pi r_{def}^2 h_{def} \\ \text{Ecuación 3.2. Volumen de deformación.} \\ & (\text{Fuente: [1]}) \end{split}$$

Además mediante la Ecuación 3.3, se tiene la relación media entre el radio y la profundidad de la picadura [20], [53].

$$\label{eq:rdef} \begin{split} r_{def} &= 26,7 x h_{def} \\ \text{Ecuación 3.3. Relación entre radio y profundidad de picadura.} \\ & (Fuente: [20], [53]) \end{split}$$

Considerando la Ecuación 1.3, Ecuación 3.1, Ecuación 3.2 y Ecuación 3.3, se determina el radio y el área de picadura con la Ecuación 3.4 y Ecuación 3.5, respectivamente.

$$r_{def} = \sqrt[3]{\frac{V_{def} \cdot 26,7}{\pi}}$$

Ecuación 3.4. Radio de picadura.
(Fuente: [20])

$$\label{eq:Adef} \begin{split} A_{def} &= \pi r_{def}^2 \\ \text{Ecuación 3.5. Área de picadura.} \\ (\text{Fuente: [20]}) \end{split}$$

Al aplicar la Ecuación 3.5 en el estudio numérico, se tiene el area de picadura en función de la fuerza aplicada, como se muestra en la Figura 3.6.





3.6.3. Comparación



Figura 3.7. Comparación entre resultados experimentales y resultados de la simulación del sensor. (Fuente: Propia)

En la Figura 3.7 se puede observar que la Gráfica de Área de picadura vs. Fuerza obtenida después de captar los impactos debido a implosión de burbujas mediante los sensores, tienen la misma tendencia de los resultados obtenidos por Escaler [5].

4. CONCLUSIONES

Se tiene que el sensor aceptable para medir impactos de cavitación sobre un ala convexa con obstáculo es mediante el uso de sensores PVDF, reconociendo también los trabajos de investigación y experimentales realizados por otros autores en casos similares, pero con otros tipos de ala y bajo condiciones diferentes de flujos de cavitación.

Se desarrolló exitosamente el estudio numérico para la obtención de presiones de impacto generadas por la implosión de cavidades, además se obtuvo las pantallas de visualización adecuadas para observar la presión de impacto, fuerza y velocidades sobre el ala convexa con obstáculo semi-cilíndrico.

Se determinó cual es la zona apropiada para la colocación de sensores y el tamaño que debe tener los sensores para evitar lecturas erróneas, tomando en cuenta consideraciones iniciales de experimentos similares.

Mediante investigaciones, se determinó que el espesor de la protección colocada sobre el ala hidrodinámica no afecta en gran cantidad. Además, el uso de productos de la misma marca permite optimizar el mejor uso de cada uno de los componentes utilizados para la medición, porque el acoplamiento de impedancias ya es considerado entre dispositivos de la misma marca. Mientras que, si se utiliza dispositivos diferentes a los recomendados, se debe considerar que las impedancias cumplan los rangos de acoplamiento.

Aunque el uso del sensor PVDF para obtener cada una de las presiones en comparación al piezoresistivo no es tan buena. Es mucho mejor, porque para un diseño es necesario conocer los valores máximos, mas no los intermedios.

Trabajos futuros

Aunque el presente trabajo brinda una base significativa para la medición de los impactos mediante sensores debido a la implosión de cavidades, se puede seguir mejorando en los siguientes puntos:

 Se recomienda realizar la simulación para comprobar si la razón de crecimiento de la burbuja y del área afectada concuerdan con los resultados obtenidos en este trabajo de investigación.

- Se recomienda utilizar una malla de sensores y comparar los resultados en las zonas donde se colocaron los sensores.
- En el presente trabajo se llegó a elegir cual es el número de sensores, tipo y ubicación idónea, como trabajos posteriores se puede implementar los sensores en un ala hidrodinámica con las características descritas para comparar con los resultados del estudio numérico del presente trabajo.
- Se tiene que, al variar el ángulo de impacto, incremento el área afectada por la cavitación, por tanto, se propone como futuros trabajos demostrar mediante simulación el incremento de la zona afectada variando tanto la velocidad del flujo a la entrada como el ángulo de impacto.

Referencias Bibliográficas

- [1] V. Hidalgo, «Numerical study on unsteady cavitating flow and erosion based on homogeneous mixture assumption», Tesis Doctoral, Universidad de Tsinghua, Beijing, 2016.
- [2] Agencia de Regulación y Control de Electricidad, «Balance Nacional de Energía Eléctrica», *Agencia de Regulación y Control de Electricidad*.
- [3] V. Hidalgo, X. Luo, X. Escaler, B. Ji, y A. Aguinaga, «Implicit large eddy simulation if unsteady cloud cavitation around a plane-convex hydrofoil», *Elsevier*, pp. 815-823, oct. 2015.
- [4] X. Escaler, P. Dupont, y F. Avellan, «Experimental investigation on forces due to vortex cavitation collapse for different materials», *Elsevier*, pp. 65-74, 1999.
- [5] X. Escaler, M. Farhat, F. Avellan, y E. Egusquiza, «Cavitation erosion tests on a 2D hydrofoil using surface-mounted obstacles», *Elsevier*, pp. 441-449, feb. 2003.
- [6] J.-P. Franc y J.-M. Michel, *Fundamentals of Cavitation:* 76, 1 edition. Springer Netherlands, 2006.
- [7] C. E. Brennen, *Hydrodynamics of Pumps*. Cambridge University Press, 2014.
- [8] V. Hidalgo, X. Luo, A. Peña, E. Valencia, R. Soto, y A. Yu, «Benefits of hydropower research in Ecuador using OpenFOAM base don CFD technology», presentado en IX Congreso de Ciencia y Tecnología - ESPE 2014, Sangolquí -Ecuador, 2014, vol. 9, pp. 1-5.
- [9] J. Baquero, «Implicit large Eddy simulation for unsteady cavitating Flow around hydrofoils using OpenFOAM software.», Escuela Politécnica Nacional, Quito -Ecuador, 2015.
- [10] M. Wosnik, L. Gomez, y R. Arndt, «Measurements in high void-fraction bubbly wakes created by ventilated supercavitation», *ASME*, pp. 1-8, jun-2005.
- [11] R. Benavente, «Supercavitación, la tecnología que nos permitirá volar bajo el mar.», *El confidencial*, 26-ago-2014.
- [12] J. Bin, X. Luo, Y. Zhang, Y. Wu, y H. Xu, «Numerical investigation of the ventilated cavitating Flow around an under-water vehicle based on a threecomponent cavitation model», jun. 2010.
- [13] «Un torpedo chino movido por supercavitación alcanzaría San Francisco en 100 minutos», RT en Español. [En línea]. Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/view/138288-torpedo-chino-alcanzara-sanfrancisco-minutos. [Accedido: 20-oct-2017].
- [14] C. E. Brennen, *Cavitation and bubble dynamics*, 1.^a ed. Pasadena. California: Oxford University Press, 1995.
- [15] P. Kottke, S. Bair, y W. Winer, «Shear cavitation», presentado en World Tribology congress III, Washington, 2005, p. 2.
- [16] C. Lyer y S. Ceccio, «The influence of developed cavitation on the flow of a turbulent shear layer.», Am. Inst. Phys., vol. 14, n.º 10, p. 3414, sep. 2002.
- [17] P. Eisenberg, «Cavitation». Hydronautics incorporated.
- [18] A. Peters, H. Sagar, y O. Moctar, «Numerical modelling and prediction of cavitation erosion», WEAR, vol. 338, pp. 189-201, sep. 2015.
- [19] D. Himmelblau, *Principios básicos y cálculos en ingeniería química*, 6.ª ed. México: PEARSON EDUCACIÓN, 2002.
- [20] M. Dular, B. Stoffel, y B. Sirok, «Development of a cavitatión erosión model», WEAR, vol. 261, pp. 642-655, ener 2006.
- [21] J. Rodríguez y R. Marín, *Fisicoquímica de aguas*. Madrid: Diaz de Santos, 1999.
- [22] T. Momma y A. Lichtarowicz, «A study of pressures and erosion produced by collapsing cavitation», *Dep. Mech. Eng.*, pp. 425-436, 1995.

- [23] H. Soyama, A. Lichtarowicz, T. Momma, y E. Williams, «A new calibration method for dynamically loaded transducers and its application to cavitation impact measurement».
- [24] P. Gustavson, D. Tasker, y J. Forbes, «PVDF pressure transducers for schock wave and explosives research», *Nav. Surf. Warf. Cent.*, pp. 1-17, 1994.
- [25] J. Hujer, J. Carrat, M. Müller, y M. Riondet, «Impact load measurements with a PVDF pressure sensor in an erosive cavitating flow», presentado en Noveno Simposio Internacional sobre cavitacitación, Lausana, Suiza, 2015, pp. 1-4.
- [26] Dynasen, «Thin Film Sensors», dynasen.com, 18-ago-2017. [En línea]. Disponible en: http://dynasen.com/product-category/thin-film-sensors/. [Accedido: 18-ago-2017].
- [27] L. Córdoba, «Estudio de la respuesta piezoeléctrica en PVDF», Universidad Carlos III, Madrid. España.
- [28] B. Jaffe, *Piezoelectric ceramics*. United State, 1971.
- [29] P. Gustavson, D. Tasker, y J. Forbes, «PVDF pressure transducers for schock wave and explosives research», *Nav. Surf. Warf. Cent.*, pp. 1-17, 1994.
- [30] A. Shirinov y W. Schomburg, «Pressure sensor from a PVDF film», *Univ. Aachen*, abr 2007.
- [31] Omega, «Strain and microstrain units and the history of the gauge sensor», *www.omega.co.uk.* [En línea]. Disponible en: https://www.omega.co.uk/literature/transactions/volume3/strain.html. [Accedido: 08-nov-2017].
- [32] Z. Li, «Assessment of cavitation erosion with a multiphase Reynolds-Averaged Navier-Stokes method.», Tesis Doctoral, Delft University of Technology, Delft, Paises Bajos, 2012.
- [33] UNAM, Visualización científica con Paraview. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
- [34] K. Moreland, *The Paraview tutorial. Version 5.2. Sandia National Laboratories. Mountain view.* California. USA.
- [35] R. Fortes-Patella, A. Archer, y C. Flageul, «Numerical and experimental investigations on cavitation erosion», presentado en 26th Symposium on hydraulic machinery and systems., Beijing, China, 2012, pp. 1-12.
- [36] H. Soyama, A. Lichtarowicz, T. Momma, y E. Williams, «A new calibration method for dynamically loaded transducers and its application to cavitation impact measurement».
- [37] E. Leal, «Sensores de presión», Universidad Francisco de Miranda, 2012.
- [38] PIEZOTECH, «S25 PVDF Sensor Mono-dimensionnal schock pressure measurement-How to use it.»
- [39] J. Alberto, «Características de un sistema de medida.», *Instrumentación I*, sep-2012. .
- [40] C. Lynch y J. Charest, «Practical considerations on the piezofilm gauge technique.», *Shock Compression Condens. Matter*, pp. 901-904, 1991.
- [41] R. Pallás, Sensores y acondicionadores de señal, 4.ª ed. Barcelona. España.: Ediciones Marcombo, 2003.
- [42] G. Silva, S. Rojas, y A. Ruiz, «Análisis de la sensibilidad de los amplificadores de carga para acelerómetros.», presentado en 6to Congreso Mexicano de acústica, Oaxaca. México, 1999, vol. 1,2.
- [43] P. Gustavson, D. Tasker, y J. Forbes, «Underwater shock wave measurements using PVDF transducers.», p. 4, 1992.
- [44] H. Vantine, J. Chan, L. Erickson, J. Janzen, R. Weingart, y R. Lee, «Prescision stress measurements in serve shockwave environments with lowimpedance manganin gauges», *Rev. Sci. Instrum.*, vol. 51, pp. 116-122, oct. 1979.
- [45] A. Cilento, «Sistemas de control de motores en tiempo real mediante Matlab», Universitat Rovira I Virgili, 2007.
- [46] B. Mihura, *Labview for data acquisition*, 1era ed. Prentice Hall, 2001.

- [47] «Sistemas de adquisición y Procesamiento de datos.pdf»...
- [48] Addlink, «Hardware : MF 634», Addlink. Software Científico. [En línea]. Disponible en: https://www.addlink.es/productos/mf-634#descripcion. [Accedido: 27-nov-2017].
- [49] C. Riba, *Diseño concurrente*, 1era ed. Barcelona. España.: Universitat Politècnica de Catalunya, 2017.
- [50] «Análisis espectral y ajuste estacional». oct-2012.
- [51] P. Lush, «Impact of a liquid mass on a perfectly plastic solid.», *J. Fluid Mech.*, vol. 135, pp. 373-387, mar. 1983.
- [52] M. Dular y O. Coutier-Delgosha, «Numerical modelling of cavitation erosion.», *Int. J. Numer. Methods Fluids*, vol. 61, pp. 1388-1410, feb. 2009.
- [53] J. Reboud, R. Fortes-Patella, y A. Archer, «Analysis of damaged surfaces. Part I. Cavitation mark measurements by 3D laser profilometry», presentado en Procedings of the 3rd ASME/JSME Joint Fluids Engineering Conference, San Francisco, CA, 1999.
ANEXO I.

CURVA DE CALIBRACIÓN DEL SENSOR PVDF MODELO PVF21-.25-EK. [26]



OUTPUT OF DYNASEN'S PIEZOFILM STRESS GAUGES, TYPE PVF 2-11 AND PVF 2-4 (AMPS UNIAXIALLY STRETCHED FILM)

ANEXO II.

CURVA DE CALIBRACIÓN DEL SENSOR PIEZORESISTIVO

MODELO Mn8-50-EK-25. [26]



ANEXO III.

Diagrama de conexiones para el sensor PVDF recomendado por Dynasen [26].



ANEXO IV

Diagrama de conexiones para el Sensor de manganina recomendado por Dynasen [26].

530-0002-00 REV 014 Summary of Dynasen Stress Gauge and Signal Conditioning Options

A generalized test arrangement is provided in Fig 11. other components may be required for testing. This is just to give the end user an over view of the major components that may be required to perform stress measurements using piezoresistive stress gauges.



A "Decade" Resistance Box, is a useful tool for 50 ohm gauge resistance change simulations that are used to calculate (Delta R)/(R initial) values.



FIGURE 11. Generalized Component Set-up for Dynasen 50 ohm Piezoresistive Gauge Applications

ANEXO V.



Dynasen's piezoresistive pulse power supply, Model CK2-50/.050-300, is a unique and most advanced pulse bridge arrangement of its kind that can be used for the excitation of 50 Ω or .050 Ω (low-impedance) shock pressure gauges. Its basic features are:

1. 115/230 AC power input. No batteries.

2. Dual-channel capabilities with either 50Ω or $.050\Omega$ gauge modes. One channel can be used with a 50Ω gauge while the other can be used with a $.050\Omega$ gauge or vise/versa.

3. Constant voltage full bridge arrangement for 50Ω gauges and constant current one-half bridge arrangement for $.050\Omega$ gauges. Each channel can be set in either 50Ω or $.050\Omega$ mode using a single front panel switch.

4. Differential gauge arrangement (50Ω) gauges only) for compensating or canceling temperature, strain, or noise effects (see page 2 of data sheet for bridge arrangements #1, #2 and #3).

5. Continuously adjustable charge voltage for each channel from 30 to 300 volts.

6. Easy bridge balancing features (50Ω gauges only) with front panel digital display.

7. Unattenuated 75 Ω bridge output and continuously adjustable 50 Ω / line driver output for each channel.

8. Front panel pulse width adjustment (5 μ sec to 500 μ sec, nominally set at 100 μ sec) with an equal duration gate output.

9. Single manual or electrical trigger capability with manual (or remote reset optional) capability.

10. Continuously adjustable trigger level from 4.0 to 50 volts.

11. All rotating knobs are self-locking verniers.

12. Aluminum chassis for rack mount or table use. DYNASEN INC.

20 ARNOLD PLACE GOLETA CA. 93117 Ph: (805) 964-4410 FAX: (805) 964 2824 On the web at: www.dynasen.com email: dynasen@concentric.net

DATA SHEET #7 pg 1 of 2

ELECTRICAL SCHEMATICS FOR THE THREE CONFIGURATIONS ON THE CK2-50/0.050-300 POWER SUPPLY



50Ω MODE - SINGLE GAUGE ARRANGEMENT (SANDIA BRIDGE)







DATA SHEET #7 pg 2 of 2

ANEXO VI.

Lista de precios de sensores Dynasen [26].

Price List # 4, 2017		THINFILM STRESS GAUGES, VELOCITY SENSORS SWITCHES 2-1-17 Concutt our webcite www.dynasen.com for construction details.									1-17		
			UNIT CONTINUE ALL REPORT ON LEAST LENGTH.										
PRICEL	187#4			Y.)			LEAD LEN	GTH L. IN	INCHES	C LENGT			
	ELEMENT SCE (in. z.in.), & ELEMENT THICKNESS (in.) (unless otherwise noted)	LEAD TYPE	152	>354	>455	>158	>657	>758	+859	+8 5 10	> 10 ≤ 11	> 11 \$ 12	NOTES
MANGANIN GAUG	E8 + LOW IMPEDIANCE (0.000 Chird),	TYPES (SYN	IE BOAL	2	8 1		2	6 - 3				8 1	3
Min10-0.066-FEP/PTFE-S	(8.15 X .075), (9.061)	CuMo	182.36	241.65	1	ex Hot Lam	inating proces	a, FEP insul	a 0.004 k. d	takk, PTFE in	al a 0.010 in	Tick.	3,4,5,7,8
MITTO-COSO-FEP-S	(2.15 X.3/10) [2.001]	CuMn	184.00	171.40	457.00	Selliot Lama	nating process	I, FEP INU.	MODEL TOP IN	ICE.	~0.005a mi	-	25.4578
H=10-0.050-EFEP-5	(0.15 X .075) (0.001)	CuMn	154.65	171.10	107.25	213.70	or Epoxy La	minating pro	CHAR FEP IN	ui la oporin	or 0 0051 \$4	ck.	23.457.6
		14081-2	0.000	" in The Spo	vy Laminating	Process for	the Gauges A	bove, FEP is	substion is 0.	005 in thick	44	S. and S	TONINA STATE
N=10-0.060-EPTFE-6	(8.15 X .078), [9.001]	CuNn	183.15	200.20 In The Exce	317.35 Viaminating	234.25 Process for 1	250.90 Te Gauges A	266.20	205.50 reutation is 0	302.60 010 m. mark	320.15	307.40	3.45.7.8
MANGANIN GAUG	ES+LOW MPED ANOL (5.000 Object	TYPE AS /ASS	VINNETTRIC.	N/I	1								
H-10-060-FEP/PTFE-AS	(2.15 X .075), (2.001)	CuMn	242.65	260.65	1	er Hot Lam	inating proces	A FEP INAL	a 0.001 in. 2	NOK PTEC IN	ad a 0.010 m	tick.	3,437.8
M110-0.060-FEP-AS	(2.15 X.075). (2.001)	CuNn	243.65	260.05	S 3	ee Hot Lami	inisting proces	. FEP Insul	a 0.005 b. #	hick.			3,4,57,8
M110-0.060-EFEP-AS	(0.15 X.075), (0.001)	CuNn	234.55	249.30	254.15	292.05	526.15	543.45	360.20	377.20	344.30	411.00	23,457.8
Harto A MALEPITE	(2.45 X 075) (2.004)	Culto.	The Epo	cy Laminadiry 1.46 m²	Process for	THE Galupes A	VIL OF	the sector	MO IN PICK	34.0	1 101 00	300.10	34478
and a standard in a wa	terne of which terms of		in The Epos	y Laminating	Process for t	He Gauges A	DOVE PTIPE &	neulation is O	DID In this		- AND		and all all
MANGANIN GALIG	E8 + (50 Ohm)	31	(iterate	and importantion	a in 6.001 in .	Dick KAPTO	W. CONSIN	an think the	insulation 1	a sint, wonth	bis - Sea moto	2 for FEP mater	a subscree
N=0-50-EX	(0.25 X 20), (0.0000)	CuMn	126.50	137.22	129.00	192.10	190.10	0.00000					123578
M-0-50-EK	(0.25 X .25), (0.0004)	CuMn	126.30	37.35	159.00	192.10	190.10	223.70	255.40	225.40	340.90	340.90	12,3578
Mina 460-EX	(8.18 X.10), (0.0004)	CuMn	126.30	137 25	159.00	192.10	190.10	223.70	255.40	225.40	340.90	340.90	123578
Mini 460-EK	(2.15 X .15), (0.000-0	CuMn	126.30	137.36	159.00	192.10	190.10	223.70	255.40	225.40	340.90	340.90	123578
CONSTANTAN ST	AN OALOES			1.00	242 24	No. of Concession, Name	and the local division of		and the second	No. of Concession, Name			-
CURCING ING OT	CAPI GAUGES - IN CHAIL (CHAI	Contraction of the second	194.95	1.150.00	1 -10 70	200.75	200.75	212.00	COS AND ON	No. No. P.	1 2020 1	90.02	115571
Cn4-50-E0 -15-L M	10.15 X 15, 10.0064	Cuico	139.25	150.30	190.70	200.75	200.75	212.00	254.30	254.30	20.05	350.05	13578
Cn4-60-B(-35-UN	(0.26 X 25), (0.0004)	CuCn	159.40	160.70	122.35	221.90	221.90	253.75	205.35	105.35	271.75	371.75	13578
() ()	0	0 0	C	0	0 0)	0	0 0	(0	Q (0
CONSTANTAN ST	RAIN GAUGES - (10 Ohm) (11-D	RECTONAL)				Standard in	nalistice in th	101-in.orb1	1008 -inch th	ISK KAPTON			
BIOn4-60-EX-135	(8.128 X.126), [8.9004]	Cuicn	139.25	150.30	150.70	200.75	200.00	202.00	264.30	394.30	20.02	20.05	12221
BIONE-BO-EX-05	(0.25 X 25), (0.0004)	CHON	158.40	190.70	182.30	221.90	221.90	253.75	382.22	28.3	271.75	371.75	1,3,5,7,8
MANO AND LOOM	TANTAN STOTAN STOTAN	O ALLOCA	-		10. O	-			The second second		<u> </u>		
How of the local sectors	IS NOT BUILD DO THE	CuMn,		187.75	-	101.00	ter er	140.001-IN	Trice Role to	a ory.			15578
Min/Cinil-80-EK	(0.26 X 0.20), [0.0004]	Cullin, Cultin	205.05	308.10	351.60	414.05	414.05						1357.8
0.5.6652 ·····	X0.6. 11 16 168	S 1994 - S	2	2	St	······································	K	2. a.C			1	55	2
PIEZOFILM STRES	S GAUGE, JUNI-MUNILY STREET	CHEED FILM)	1		dand invaliant	air is 0.001-i	n thick KAP	TON. 0.001	Houts thick P	P insulatio	o la siac sual	atia.	and the second second
PVT211-040-EK	(0.040 x 0.040), [0.0011]	Cu	151.95	182.05	192.05	192.05	240.55	202.55	342.55	305.90	305.90	305.90	1,2,3,5,87,6
PvF+11-125-EX	(0.125 = 0.125), (0.0011)	Cu	151.95	192.05	192.05	192.05	190.05	262.55	240.55	305.90	305.90	305.90	123587.0
PVP311-38-40K	(0.250 X 0.250), (0.0011)	Cu	170.40	230.75	230.75	230.75	311.05	311.05	311.65				123587,0
DECISION IN AND CO	CALLOF		10000	-	1.1		Contraction of the local division of the loc		and the second		and the second second	ALL PROPERTY AND	
PIEZUHUM STREE	SS GAUGE, IN ADALLY IMPTCH	HOLD PILLING	The	es trinegau	gee only acid	d with Const	antan bitein	Gauges (Cn	4-40-40(), 30	andard insul	ation is 0.001-	IN THER NAPTON	
PVF210-125-EX	(0.125 1 0.125), (0.0010)	Cu Cu	197.90	211.20	211.35	211.35	207.05	207.00	207.00	310.70	20.70	203.70	123587.0
AND THE PARTY OF THE	ferrer v a stand formulat		Incer	-	1			10 C		-			1 A A A A A A
CI COTTONES ONE				1.	1. A.	-	-						
ELECTHORAGNE	Circuit Court GAUGES	Co. Andr.	406-00	1. 145.00	145.00	100.00	200.00	216 00 001-IN	209.00	204.05	24.05	294.05	1674
ENVS-S-EK	(Sem) [5.0005n]	Cur(folt	114.65	152.00	152.00	152.90	219.00	219.00	218.80	250.00	250.00	254.00	1,5,7,0
		_							-				
SELF - SHORTING	SWITCHES	17 J	1	22	125	Iterd	ed insulation	1 is 0.001 in.	THE KAPT	W only.	1	2 A A	
50510-26-EK	(0.25 x 0.25), [0.001thick Hapton]	Ou	106.00	141.25	141.35	141.35	200.25	202.25	200.25	227.20	227.20	227.20	1,3,5,0,7,2
AD\$15-025-EK	0.025in da hoie]	04	124.95	140.40	140.40	140.40	213.40	213.40	213.40	250.50	250.50	250.50	1357.8
IONIZATION SWIT	CHES IDEN INTE	-		and the second second	101 1	Star in	and in a state of	A IS DON AND	thick Mapping	W only	10	22	-
State in the second	The second se	1	Califor	1	1			and and a set		and see and	1		1
OFADS-S-DI	(0.5 × 0.5), (1.0005)	Ou	Oude									ļ.	1,5,7,8
PIEZO-ELECTRIC	SWITCHES			12		Stands	and installation	la 0.001-in.	thick MAPTO	W only.		·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
Barra and and a start of the st	(2.25 x 0.25), (0.0011in, thick PVOF		5	2	16 H		Sec. and	Burnet	and the second second	-		d	and the second sec
PV7.5-25-EK	Film]	04	170.40	230.75	220.75	230.75	311.05	311.85	311.85	1	I		1,3,5,7,8

THEORROW ALL OF DYNASENS PRODUCTS: DYNASEN MANUFACTURES CUSTOM SENSORS OF ALL SZES. IF YOU DO NOT FIND WHAT YOU REQUIRE ON THESE PRICE LISTS PLEASE GIVE US A CALL AND WE WILL WORK WITH YOU TO MEET YOUR SPECIAL MEEDS.

NOTE: 9-Prove Rubies Induce NOTE: 9-Prove Rubies Induce 1 Specify gauge model, element date, lead length, bit length and insulation type and blickness. For 50bim gauges using legion, 0.5, 2, 3 or 5 mil XAPTON insulation is available at 57.55 additional per gauge. 2 For 1 mil TEP insulation option, add \$11.95 to beach 30 ofm gauge unit prote. 3 Gauges resulties with 0000°5 inch autimum atteic for LUMP entro domosition. Additional \$24.00 per gauge for up to 3 inches. For longer gauges please call for pricing. 4 Gauded insulation with lis 1 inch. Add \$3.25 for each nd of with up to a maximum of 1 inches. Typical length of insulation beyond exement is equarity to 10 or into a within of volta-per gauges into a call of the set inches. For Road editory an additional we in subject to the set in the origin of the set inches. The set is an other in 1-west and according to the following. To whip an other in 1-west after re-set of order, add \$50% to sho in 2-weeks add 35%. In this in the 3-Weeks add 15%. Dynamic Sale/Payment terms: the 30 days (upon account approval), with a 7% per day sently the splice to both incode sentout for this payment. VIGA AND MARSTITICAND ADDITIVED ON LINE ON CLL. INFORME \$60-594-4410 ON FAX # \$605-897-2824. ONNAGEN NO. 23 ANNOLD PLACE, GOLETA, CALIFORNIA 23517, USA. Chine Web & www.dynamen.com, and info@dynamen.com purples are shorted on a vision-9-weeks add the price for the Sector when an integrities to the set web in the sector one of the the web shorted in the set of the set payment is an addition of the web diverses one of the the web diverses one of the set of the set

VISA AND WASTERCARD ADCEPTED ON ALL ORDERS, CALL FOR DETAILS PHONE 505-564-4410 OR FAX:# 506-647-3234 DYNADEN INC. 25 ARNOLD PLACE, GOLETA, CALIFORNIA 52117, USA

ANEXO VII.

Lista de precios de conectores Dynasen [26].

CONTRACTOR IN CONTRACTOR

VACUUM FEEDTHROUGH AND CASLE ASSEMBLIES Consult our website <u>www.dynasen.com</u> for construction details.

PRICE LIST #3					10 - 20	in-100	101-280	251 3 500	501 ye 1000	1001+	NOTES
WODEL #			DESCRIPTION	1.8							
_	CREARD	QN/LERC	SWODDLE PERSONNECCOM							-	
	TERMINATORS	TERMINA/ICRO		<u> </u>	0 - C						-
A114	IZDAP.	CONF.	WITH HEX NUT MOTION RINGL	46.75	36.00	12.82		29.00	20.05	39.45	4.1
	T25 NE WALF	CISIPE MALE	Totale, CARLE CONSECTOR BACK BAC, SACLAR PROBABLING STATUSES STEEL PROTOR SACH WITH THOR THREAD, OTHERS AND AND TO READ, STATUS PROSSERS								
A-108	LCONN-	CONS	TRATED, VM TEXTED	78.80	18.00						6.7
			and the second start second	1000		- CAL	TOR PRI	ONG 1			
CAPTION 1	- Laborni	COM	125-MIL VECULIN FEED THROUGH				_			1 2	4.1
	10-54 F 172.		CABLE ATTAINALET	22	22 - SA		1.1	2			1.11
	TERMINATION	Taktenychone				11		11			1
We MANNE:	RE SEL MACH	MNC .	ADAPTINE HOR CORRECTING A SUBILITY PIN COMPLETION CARLE (24-114) SERVES CARLES (10-4 COMPLEX RAC PORT	-	2885	11.62	80	25	20	243	6.T
Series 1			RO-TINU CABLE WITH PRIMAL AT			3219	1000	1200	23.14		10.15
Attabil.	953 (AL	P23 TAE.	BOTH ROOM	825	7.25	125	6.02	385	3.65	545	42.8.7
actes -	REMIT COMM	PIX TAL	RD-C INCLORES WITH REAL DOWNECTOR AT ONE FIND AND PRIMAL AT OTHER FIND	TRINE	1571	16.85	13.70	13.30	12.15	12.80	11.87.
24100.0	NI MIL COMM	HNC .	KOATING CARLS WITH REME. CONNECTOR AT CHE MAD AND MADE ENCAT CONSIGN RAD, (Main RAC), Checked, for optimal Particle RAC, See Nate 2)	10.00	28.85	14.55	2.6	2.56	20.05	215	
20.000 3	114234		RONTINU CARLE WITH RT AMOUNTS	Contra State	1.1.1.1.1.1.1					1.00	
	KI ME WIT	2012 1245	MUDDINISCIDE AT ONE END AND	10.00	10.00	-	146	Citize 1	See.		1000
DATING COM	LUCHN .	PER UNA	KONTROLEMENT AND	10.46	()))				20.00	2.0	AAA.
	KIME HT		a designed for college Perceip Web, New								
A-1140-0	DOM	8142	No. 17	48.90	41.40	19:85	38	38.10	12.80	\$1.72	22,455,7
			RO-1760 CARLE WITH 125 ML				1.70.00				
21-1121	125 ME. CONK.	125 Mil, CEMPL	COMPONENTIRAL BODY ENDS	2.8	23.80	18.30	18.02	11.55	12.35	10.15	2,2,6,7
	and some of	maria	CONNECTOR AT ONE END AND								
ATION	125-MS CONS.	PR3 TAL.	PIGTAL AT OTHER END	19:00	1850	10.13	13.80	13.56	13.35	1.1815	SEST.
	ST ML CONV.	NO MIL COMM	REATING CARLS WITH 125 MIL COMMECTOR AT CAS AND AND RE- MIL COMPLETOR AT CHER SND.	28	20.82	19.37	18.20	17.55	17:30	10.15	ALAT
			REFITING CARLS WITH 125 MI, DOWNEDTOR AT ONE FIND AND MALE END AT DIVER END, MAR END &								
A110-4	125 ME CONS.	ATVC.	Marchard, for optional Personale MAC See	30.75	28.82	30.05	24.60	24.00	23.00	21.83	234547
			ROMINGLICARLE WITH MADE BHIL COMMECTOR AT ONE BHD AND POTAL AT OTHER BHIL (BAS BHILM) dented, for options Person BHC See				000000				
A1160-2	875	PR1 196	form all	20.10	17.12	19.00	12.60	12.02	14.89	16.75	XAAAA I
A110-8	125 ME CONS	M ML CONN	REFINE CARLS WITH 125 ME DOMECTOR AT ONE END AND IN ME CONNECTOR AT OTHER END	29.12	23.55	31.45	22	-18.00	19.40	1930	1.1.4.1
Attel	WVC	inc.	HIGH THE CARLS WITH MALE SHO COMPLETION AT ROTH ENDS: (Main SHC waterdard, An optimal Female SHC Ine Auto 2)	and a	2285	27.85	22.28	716	2.42	21.35	23.4.6.8.7
N/N- Takishu:	Salati MACH DOMB	HAC	ADAPTINE FOR CONNECTING A 16 MIL PIN CONNECTION CASES (24-118) SERVES (24-24) TO A CONNENT RIVE FORT.	41.52	38.85	17.82	5.0	26	20	3.45	6.7
09-110-1	BE ME CORN.	PRI DAL	RO-MINU CARLS WITH M-BIL COMMECTOR AT CAR END AND PRITAL & CITHER END	20.95	1835	17.85	18.85	18,20	13 05	15.85	2.5,6,7
		1925	RD-11U CASLE WITH DEAL COMPECTOR AT DIS END AND MALE SHOL COMPLETION AT OTHER, SAME SHOL IN BUILDED, TO SOLUMI FEITURE								19772
A1160	BE MEL COMM	- HNC	RND Rev Yole 2)	28.52	28.85	21.82	2.0	2.6	20.00	25.45	23,4,5,8,7
A1163	BUNL RT	PER CAL	REFIELD AND WITH BY BANK CONNECTOR AT ONE END AND POTAL ATOTHER END	8.0	31.80	3165	3.0	28	22.15	17.55	B.B.B.T
		1.22	KG-CTARLEWITH BY READ. CONTECTOR AT DNE END AND MALE AND CONNECTOR AT DTHER END THER END IN GRIERE TO UNKNOW								13772
2012/08/0	DOM:	MNC	Premiate MNC Xee No.6e 2]	50.05	42.45	39.12	3.5	11.60	37.90	37.42	4,8,6,8,7

۲.

ANEXO VIII.

Tipos de cables Dynasen para conexiones.



ORDEN DE EMPASTADO